PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-302751

(43) Date of publication of application: 24.10.2003

(51)Int.CI.

C08F 2/44 C08F283/00 C08F290/10 G03F G03F 7/038 G03F

(21)Application number: 2002-106138

(71)Applicant: KANEGAFUCHI CHEM IND CO LTD

(22)Date of filing:

09.04.2002

(72)Inventor: OKADA YOSHIFUMI

KOKAWARA KAORU YAMANAKA TOSHIO

(54) PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION AND DRY FILM RESIST USING THE SAME

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a photosensitive resin composition having photosensitivity and flame resistance, excellent in heat resistance while having satisfactory mechanical strength and excellent also in workability and adhesiveness and to provide a photosensitive dry film resist using the same.

SOLUTION: The photosensitive resin composition comprises (a) a phosphazene compound having at least one polymerizable functional group, per molecule, selected from vinyl, allyl, acryloyloxy, methacryloyloxy, acryloyl and methacryloyl, (b) a soluble polyimide, (c) a compound having a carboncarbon double bond and (d) a photoreaction initiator.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THE DAGE BLANK (USTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-302751 (P2003-302751A)

(43)公開日 平成15年10月24日(2003.10.24)

(51) IntCl.7		識別記号		F	I		ī	-7]-ド(参考)
G03F	7/004	501		G	03F 7/00)4	501	2H025
		5 1 2					5 1 2	4 J O 1 1
C 0 8 F	2/44			C	08F 2/44	ļ	С	4 J O 2 6
	283/00				283/00)		4 J O 2 7
290/10					290/10)		
			審查請求	未請求	請求項の数で	7 OL	(全 24 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号 特顧2002-106138(P2002-106138)

平成14年4月9日(2002.4.9)

(71)出顧人 000000941

鐘淵化学工業株式会社

大阪府大阪市北区中之岛3丁目2番4号

(72)発明者 岡田 好史

大阪府摂津市鳥飼西5-1-1

(72)発明者 高河原 薫

大阪府摂津市鳥飼西5-1-1

(72)発明者 山中 俊夫

大阪府摂津市鳥飼西5-1-1

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 感光性樹脂組成物およびそれを用いたドライフィルムレジスト

(57)【要約】

(22)出願日

【課題】感光性および難燃性をゆうし、充分な機械強度を有しつつ、耐熱性に優れ、更に加工性、接着性に優れた感光性樹脂組成物及びそれを用いた感光性ドライフィルムレジストを提供することを目的とする。

【解決手段】(a)分子中に、ビニル基、アリル基、アクリロイルオキシ基、メタクリロイルオキシ基、アクリロイル基から選ばれる重合性官能基を少なくとも1個有するホスファゼン化合物、(b)可溶性ポリイミド、c)炭素-炭素二重結合を有する化合物、(d)光反応開始剤を含有する感光性樹脂組成物を用いることにより、上記問題を解決することが出来る。

【特許請求の範囲】

【請求項1】a)分子中に、ビニル基、アリル基、アクリロイルオキシ基、メタクリロイルオキシ基、アクリロイル基から選ばれる重合性官能基を少なくとも1個有するホスファゼン化合物、

b) 可溶性ポリイミドを必須成分とする感光性樹脂組成物。

【請求項2】請求項1記載の2成分に加えc)炭素-炭素二重結合を有する化合物必須成分とする感光性樹脂組成物。

【請求項3】請求項2記載の3成分に加えd)光反応開始剤を必須成分とする感光性樹脂組成物。

【請求項4】a)成分が分子中に少なくとも1個のアクリロイルオキシ基置換フェニル基、アクリロイルオキシアルキル基置換フェニル基、メタクリロイルオキシ基置換フェニル基又はメタクリロイルオキシアルキル基置換フェニル基を有する繰り返し数3~10000のホスファゼン化合物であることを特徴とする請求項1~3いずれかに記載の感光性樹脂組成物。

【請求項5】a)成分のフォスファゼン化合物が、一般 20 式 (1)

【化1】

(式中、R¹及びR¹は同一又は異なって、水素原子、炭素数1~18のアルキル基、炭素数5~8のシクロアルキル基、炭素数6~14のアリール基、炭素数6~14のヒドロキシアリール基、炭素数7~18のアルキルアリール基、炭素数2~18のアルケニル基、炭素数8~18のアルケニルアリール基、シアノ基又は一般式(2)

【化2】

〔式中R³ は水素原子又はメチル基を示す。mは $0\sim6$ 40 の数を示す。〕で表される基、又は一般式(3)

【化3】

$$\frac{1}{\parallel} \left(CH_2 \right)_p \stackrel{O}{=} C - CR^3 = CH_2$$

(式中R'は上記に同じ。pは0~6の数を示す。)で表される基、又は一般式(4)【化4】

 $\frac{\|(CH_2)_{\alpha}(CH_2)_{\beta}}{\|(CH_2)_{\beta}\|}$

[q、sは0~6の数、rは0又は1の数を示す。] で 表される末端にビニル基を有する置換基で置換されたフ ェニル基を示す。但し、n個のR¹及びR¹のうち、少な くとも一つは一般式(2)、一般式(3)又は一般式 (4) で表される置換フェニル基を示すものとする。n 10 は3~1000の数を表し、両末端は環構造を形成す ることにより互いに結合しているか、または線状構造を 取ってそれぞれ異なる末端を有している。とこで、線状 構造の末端基として、リン原子側は基 $-N = P(OR^1)$ 3、基-N=P(OR'),、基-N=P(=O)OR'又は基 -N=P(=O)OR¹を示し、窒素原子側は基-P(OR ¹),、基-P(OR²),、基-P(=O)(OR¹),又は基-P(=O)(OR¹),を示す。R1及びR2は前記と同じ。) で表わされる重合性官能基を有する環状及び/又は鎖状 のホスファゼン化合物から選ばれる少なくとも1種であ るととを特徴とする請求項1~4いずれかに記載の感光 性樹脂組成物。

【請求項6】請求項1~5いずれか記載の感光性樹脂組成物を用いることを特徴とする感光性ドライフィルムレジスト。

【請求項7】請求項6記載の感光性ドライフィルムレジストをプリント基板のカバーレイとして用いることを特徴とする感光性カバーレイフィルム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は感光性樹脂組成物、およびそれを用いた感光性ドライフィルムレジストに関し、より詳しくは特に電子材料の分野で使用されるプリント基板用あるいは、ハードディスク用サスペンション に用いられ、接着剤を介さずに直接積層される耐熱性の感光性カバーレイフィルムに関する。

[0002]

【従来の技術】近年、電子機器の高機能化、高性能化、小型化が急速に進んでおり、それに伴い電子部品の小型化や軽量化が求められている。とのため、電子部品を実装する配線板も通常のリジッドプリント配線板に比べ、可撓性のあるフレキシブルプリント配線板(以下FPCという)が従来にも増して注目され急激に需要を増している。

【0003】ところで、このFPCには導体面を保護する目的で表面にカバーレイフィルムと呼ばれる高分子フィルムが貼り合わされている。このカバーレイフィルムを導体面の表面に接着する方法としては、所定の形状に加工した片面に接着剤の付いたカバーレイフィルムをFPCに重ね、位置合わせをした後、プレス等で熱圧着する方法が一般的である。しかし、ここで用いられる接着

剤はエポキシ系やアクリル系接着剤等が主流であり、半田耐熱性や高温時の接着強度などの耐熱性が低かったり、可撓性に乏しかったりしカバーレイフィルムに用いられるポリイミドスフィルムの性能を充分活かすことができなかった。

3

【0004】また、従来のエポキシ系やアクリル系の接着剤を使用して、カバーレイフィルムをFPCに貼り合わせる場合、貼り合わせる前のカバーレイフィルムに回路の端子部や部品との接合部に一致する穴や窓を開ける加工をしておかなければならない。しかし、薄いカバー 10レイフィルムに穴等を開けるのが困難なだけでなく、カバーレイフィルムの穴等を、FPCの端子部や部品との接合部に合わせる位置合わせはほとんど手作業に近く、作業性及び位置精度が悪くまたコストもかかるものであった。

【0005】とれらの作業性や位置精度を改善するために、感光性組成物を導体面に塗布し保護層を形成する方法や、感光性カバーレイフィルム(感光性ドライフィルムレジストをカバーレイフィルムとして用いたもの)の開発がなされ、作業性と位置精度は向上した。

【0006】ところが上記の感光性カバーレイフィルムには、アクリル系の樹脂が用いられているため、耐熱温度やフィルムの脆性が十分ではなく、また難燃性がまったくないものであった。これらの問題改善のために感光性ポリイミドが求められ、エステル結合を介してメタクロイル基を導入した感光性ポリイミド(特公昭55-030207、特公昭55-041422)やメタクロイル基を有するアミン化合物あるいはジイソシアネート化合物をポリアミド酸のカルボキシル基部位に導入した感光性ポリイミド(特開昭54-145794、特開昭59-160140、特開平03-170547、特開平03-186847、特開昭61-118424)が開発された。

【0007】しかし、これらの感光性ポリイミドは、ポリアミド酸の状態で露光・現像したのちにイミド化して初めて得られるため250℃以上の温度をFPCにかけなければならなかったこと、感光性ポリイミドによってはアクロイル基を熱により除去する必要がありその際に膜厚減少が大きいという問題があり、FPC用途には用いられていない。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】そこでこの様な従来の問題点を解決し、感光性および難燃性を有し、充分な機械強度を有しつつ、耐熱性に優れ、更に加工性、接着性に優れた感光性樹脂組成物及びそれを用いた感光性ドライフィルムレジストを目的とする。またこのドライフィルムレジストをフレキシブルプリント基板に積層し、良好な物性を示す感光性カバーレイフィルムを提供することも目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明は以下の新規な感光性樹脂組成物および感光性ドライフィルムレジストを 提供するものであり、これにより上記課題を解決しう る。

(1) a) 分子中に、ビニル基、アリル基、アクリロイルオキシ基、メタクリロイルオキシ基、アクリロイル基 基、メタクリロイル基から選ばれる重合性官能基を少なくとも1個有するホスファゼン化合物、b) 可溶性ポリイミドを必須成分とする感光性樹脂組成物。

(2)請求項1記載の2成分に加えc)炭素-炭素二重 結合を有する化合物必須成分とする感光性樹脂組成物。

(3)請求項2記載の3成分に加えd)光反応開始剤を 必須成分とする感光性樹脂組成物。

(4) a) 成分が分子中に少なくとも1個のアクリロイルオキシ基置換フェニル基、アクリロイルオキシアルキル基置換フェニル基、メタクリロイルオキシ基置換フェニル基又はメタクリロイルオキシアルキル基置換フェニル基を有する繰り返し数3~10000のホスファゼン化合物であることを特徴とする請求項1~3いずれかに20 記載の感光性樹脂組成物。

(5) a) 成分のフォスファゼン化合物が、一般式

(1)

[0010]

[化5]

$$\begin{array}{c}
OR^1 \\
P = N \\
OR^2
\end{array}$$

【式中、R¹及びR¹は同一又は異なって、水素原子、炭素数1~18のアルキル基、炭素数5~8のシクロアルキル基、炭素数6~14のアリール基、炭素数6~14のヒドロキシアリール基、炭素数7~18のアルキルアリール基、炭素数2~18のアルケニルを、炭素数8~18のアルケニルアリール基、シアノ基又は一般式(2)

[0011]

【化6】

$$\frac{1}{||}\left(CH_{2}\right)_{m}O - CR^{3} = CH_{2}$$

〔式中 R^3 は水素原子又はメチル基を示す。mは $0\sim6$ の数を示す。〕で表される基、又は一般式(3)

[0012]

[1E7]

$$\frac{1}{\parallel \left(CH_{2} \right)_{p}} \stackrel{O}{C} - CR^{3} = CH_{2}$$

50

40

〔式中R'は上記に同じ。pは0~6の数を示す。〕で 表される基、又は一般式(4)

[0013]

[化8]

$$\frac{1}{|I|} \left(CH_2 \right)_q \left(O \right)_r \left(CH_2 \right)_s$$

 $[q \times st0 \sim 6$ の数、rt0又は1の数を示す。〕で 表される末端にビニル基を有する置換基で置換されたフ 10 ェニル基等の重合性官能基を有するホスファゼン化合物 ェニル基を示す。但し、n個のR1及びR1のうち、少な くとも一つは一般式(2)、一般式(3)又は一般式 (4) で表される置換フェニル基を示すものとする。 n は3~1000の数を表し、両末端は環構造を形成す ることにより互いに結合しているか、または線状構造を 取ってそれぞれ異なる末端を有している。ととで、線状 構造の末端基として、リン原子側は基 $-N=P(OR^1)$ 3、基-N=P(OR'),、基-N=P(=O)OR¹又は基 -N=P(=O)OR'を示し、窒素原子側は基-P(OR 1),、基-P(OR1),、基-P(=O)(OR1),又は基-P(=O)(OR'),を示す。R'及びR'は前記と同じ。) で表わされる重合性官能基を有する環状及び/又は鎖状 のホスファゼン化合物から選ばれる少なくとも1種であ ることを特徴とする請求項1~4いずれかに記載の感光 性樹脂組成物。

(6)請求項1~5いずれか記載の感光性樹脂組成物を 用いることを特徴とする感光性ドライフィルムレジス ١.

(7)請求項6記載の感光性ドライフィルムレジストを プリント基板のカバーレイとして用いることを特徴とす 30 る感光性カバーレイフィルム。

[0014]

【発明の実施の形態】まず本発明に用いられるフォスフ ァゼン化合物について説明する。本発明の感光性樹脂組 成物には、重合性官能基を有するホスファゼン化合物の うちから選ばれる少なくとも1種が配合される。 とと で、重合性官能基としては、ビニル基、アリル基、アク リロイルオキシ基、メタクリロイルオキシ基、アクリロ イル基、メタクリロイル基及びこれらを含有する各種の 基等を例示できる。尚、本明細書に於いて「(メタ)ア クリロイルオキシ (アルキル) 基」とは、アクリロイル オキシ基、アクリロイルオキシアルキル基、メタクリロ イルオキシ基(メタアクリロイルオキシ基)又はメタク リロイルオキシアルキル基(メタアクリロイルオキシア ルキル基) の各基を、また「(メタ) アクリロイル(ア ルキル) 基」とは、アクリロイル基、アクリロイルアル キル基、メタクリロイル基(メタアクリロイル基)又は メタクリロイルアルキル基(メタアクリロイルアルキル 基) の各基を示す。また、アクリロイルオキシ基、メタ クリロイルオキシ基(メタアクリロイルオキシ基)は、

慣用的にはアクリル基、メタクリル基(メタアクリル 基)とも呼ばれることがある。

【0015】本発明の難燃剤として用いられるホスファ ゼン化合物は、NP結合を有するモノホスファゼンが3 ~10000個繰り返された(繰り返し数3~1000 0) ホスファゼン化合物であって分子中に少なくとも1 個のビニル基置換フェニル基、アリル基置換フェニル 基、(メタ)アクリロイルオキシ(アルキル)基置換フ ェニル基、(メタ)アクリロイル(アルキル)基置換フ

【0016】より詳しくは、本発明の難燃剤として用い られるホスファゼン化合物は、NP結合を有するモノホ スファゼンが3~10000個繰り返されたホスファゼ ン化合物であって該化合物分子中に少なくとも1個のビ ニル基置換フェニル基、アリル基置換フェニル基、(メ タ) アクリロイルオキシ (アルキル) 基置換フェニル 基、(メタ)アクリロイル(アルキル)基置換フェニル 基、アクリロイル基、メタクリロイル基等の重合性官能 20 基を有するホスファゼン化合物から選ばれる1種以上の フォスファゼン化合物であって、中でも、前記ホスファ ゼン化合物は、モノホスファゼンの繰り返し数3~15 のものが好ましい。

【0017】上記フォスファゼン化合物の具体例として は、例えば、一般式 (1)

[0018]

[化9]

$$\begin{pmatrix}
OR^1 \\
P = N \\
OR^2
\end{pmatrix}_n$$

〔式中、R¹及びR¹は同一又は異なって、水素原子、炭 素数1~18のアルキル基、炭素数5~8のシクロアル キル基、炭素数6~14のアリール基、炭素数6~14 のヒドロキシアリール基、炭素数7~18のアルキルア リール基、炭素数2~18のアルケニル基、炭素数8~ 18のアルケニルアリール基、シアノ基又は一般式 (2)

[0019]

【化10】

〔式中R³ は水素原子又はメチル基を示す。 mは0~6 の数を示す。〕で表される基、又は一般式(3)

[0020]

【化11】

50

〔式中R'は上記に同じ。pは0~6の数を示す。〕で表される基、又は一般式(4)

[0021]

【化12】

$$\frac{\|\left(CH_{2}\right)_{q}\left(O\right)_{r}\left(CH_{2}\right)_{s}}{\|CH_{2}\|_{s}}$$

 $[q, s は 0 \sim 6 の 数、 r は 0 又 は 1 の 数を示す。] で$ 表される末端にビニル基を有する置換基で置換されたフ ェニル基を示す。但し、n個のR1及びR2のうち、少な くとも一つは一般式(2)、一般式(3)又は一般式 (4) で表される置換フェニル基を示すものとする。 n は3~10000の数を表し、両末端は環構造を形成す ることにより互いに結合しているか、または線状構造を 取ってそれぞれ異なる末端を有している。ととで、線状 20 構造の末端基として、リン原子側は基-N=P(O R'),、基-N=P(OR'),、基-N=P(=O)OR'又 は基-N=P(=O)OR'を示し、窒素原子側は基-P (OR1),、基-P(OR1),、基-P(=O)(OR1),又は 基-P(=O)(OR'),を示す。R'及びR'は前記と同 じ。)で表わされる重合性官能基を有する環状及び/又 は鎖状のホスファゼン化合物を、構成単位として含む化 合物を例示でき、中でも、一般式(2)で表される重合 性官能基を有する一般式(1)の環状及び/又は鎖状の ホスファゼン化合物が好ましい。

【0022】上記一般式(1)で表わされるホスファゼン化合物の中でも、繰り返し数(n)が3~15であるホスファゼン化合物が特に好ましい。本発明のフォスファゼン化合物は、少なくとも1個の重合性官能基(例えば、(メタ)アクリロイルオキシ(アルキル)基置換フェニル基)を有する環状及び/又は鎖状のホスファゼン化合物から選ばれる1種又は2種以上を構成単位とする化合物である。

【0023】本発明の難燃剤の原料として用いられる少なくとも1個の(メタ)アクリロイルオキシ(アルキル)基置換フェニル基を有する環状及び/又は鎖状のホスファゼン化合物は、例えば、ヒドロキシ基を有する環状及び/又は鎖状のホスファゼン化合物と(メタ)アクリル酸、(メタ)アクリル酸ハライド又は(メタ)アクリル酸無水物とを、好ましくは、ベンゼン、トルエン、キシレン、エーテル、テトラヒドロフラン等の有機溶媒中にて、室温下で1~20時間、次いで反応を完結するために使用した溶媒の還流温度で約1~3時間反応を行うことによって製造できる。

【0024】ことでヒドロキシ基を有する環状及び/又 50 ることにより製造できる。その際、(メタ)アクリロイ

は鎖状のホスファゼン化合物は、例えば、横山正明ら、 工業化学雑誌, Vol. 67, No. 9, p. 1378 (1964)、奥橋 朋也ら、工業化学雑誌, Vol. 73, No. 6, p. 1164 (197 0)、特開昭58-219190 号公報、Alessandro Medici, et. al., Macromolecules, Vol. 25, No. 10, p. 2569 (19 92) 等に記載の方法に従って製造できる。例えば、2価 フェノールの一方の水酸基がメチル基又はベンジル基で 保護された4-メトキシフェノール、4-(ベンジルオ キシ)フェノールのリチウム塩、ナトリウム塩又はカリ ウム塩と塩化ホスホニトリル (特開昭54-14539 4号公報、特開昭54-145395号公報等)とを反 応させ、その後にピリジンハロゲン化水素酸塩又は三臭 化ホウ素との反応によって、メチル基又はベンジル基を 脱保護し、水酸基に変えるととで製造できる。また、ヒ ドロキシアルキルフェノールのリチウム塩、ナトリウム 塩又はカリウム塩と塩化ホスホニトリルとを反応させる ことによっても製造できる。また、部分的にヒドロキシ 基置換フェノキシ基を有する環状及び/又は鎖状のホス ファゼン化合物の製造は、2価フェノールの一方の水酸 基がメチル基又はベンジル基で保護された4-メトキシ フェノール、4-(ベンジルオキシ)フェノール及び/ 又はヒドロキシアルキルフェノールのリチウム塩、ナト リウム塩又はカリウム塩と塩化ホスホニトリルの反応の 際に、アルコール系又はフェノール系化合物のリチウム 塩、ナトリウム塩又はカリウム塩を同時に使用すること により製造できる。

【0025】ヒドロキシ基を有する環状及び/又は鎖状 のホスファゼン化合物と(メタ)アクリル酸との反応に 際しては、塩酸又は硫酸等の鉱酸、ベンゼンスルホン酸 又はp-トルエンスルホン酸等の有機酸、塩化スズ、塩化 亜鉛、塩化第二鉄、塩化アルミニウム等の金属ハロゲン 化物等の触媒の一種又は二種以上を組み合わせて用いて もよい。また、ヒドロキシ基を有する環状及び/又は鎖 状のホスファゼン化合物と(メタ)アクリル酸ハライド (例えば、アクリル酸クロライド及び/又はメタクリル 酸クロライド)の反応に際しては、脱ハロゲン化水素を 行うために、トリエチルアミン又はピリジン等の塩基、 又は合成ゼオライト等の合成吸着剤を使用してもよい。 また、ヒドロキシ基を有する環状及び/又は鎖状のホス ファゼン化合物とアクリル酸無水物及び/又はメタクリ ル酸無水物との反応に際しては、反応によって生成する アクリル酸及び/又はメタクリル酸を溶媒と共に系外に 除去することが好ましい。

【0026】本発明のフォスファゼン化合物の原料として用いられる少なくとも1個の(メタ)アクリロイル(アルキル)基置換フェニル基を有する環状及び/又は鎖状のホスファゼン化合物は、塩化ホスホニトリルと該(メタ)アクリロイル(アルキル)基置換フェノール類のナトリウム塩又はカリウム塩とを常法により反応させることにより製造できる。その際、(メタ)アクリロイ

ル (アルキル) 基の部分で重合反応が進行しないよう に、反応はテトラヒドロフランのような不活性な有機溶 媒中で0℃付近で行うのがよい。また、反応が充分に完 結しない場合には、重合禁止剤を加えた後、徐々に温度 を上げて反応を行えばよい。

【0027】本発明のフォスファゼン化合物の原料とし て用いられる少なくとも1個の末端ビニル基置換フェニ ル基を有する環状及び/又は鎖状のホスファゼン化合物 (但し、一般式(4)において、r=1の場合)は、例 えばヒドロキシ基を有する環状及び/又は鎖状のホスフ ァゼン化合物とハロゲン化ビニルやハロゲン化アリルや ハロゲン化-1-アルケニル類とを、トリエチルアミン やピリジン等の脱酸剤の共存下、好ましくは、アセト ン、酢酸エチル、クロロホルム、ベンゼン、トルエン、 キシレン、エーテル、テトラヒドロフラン等の有機溶媒 中にて、0℃~室温(例えば20~30℃)下で1~1 〇時間、次いで反応を完結するために使用した溶媒の還 流温度で約1~2時間反応を行うことによって製造でき る。また、一般式(4)において、r=0の場合には、 塩化ホスホニトリルと該末端ビニル基置換フェノール類 20 ホスファゼン、テトラ ((メタ) アクリロイルオキシブ のナトリウム塩又はカリウム塩とを常法により反応させ ればよい。その際、末端ビニル基が重合しないように、 反応はテトラヒドロフランのような不活性な有機溶媒中 で例えば-78℃~0℃低温下で1~20時間かけて行 うのがよい。

【0028】(メタ)アクリロイルオキシ(アルキル) 基置換フェニル基を有する環状及び/又は鎖状のホスフ ァゼン化合物の具体例としては、例えば、 (メタ) アク リロイルオキシフェノキシーペンタフェノキシシクロト リホスファゼン、ジ((メタ)アクリロイルオキシフェ 30 ルオロエトキシ基、エチルフェノキシ基、ナフチルオキ ノキシ) - テトラフェノキシシクロトリホスファゼン、 トリ((メタ)アクリロイルオキシフェノキシ)ートリ フェノキシシクロトリホスファゼン、テトラ((メタ)ア クリロイルオキシフェノキシ) -ジフェノキシシクロト リホスファゼン及びペンタ((メタ)アクリロイルオキ シフェノキシ) -フェノキシシクロトリホスファゼン等 の (メタ) アクリロイルオキシフェノキシ基とフェノキ シ基を混合置換したシクロトリホスファゼン及びヘキサ (メタ) アクリロイルオキシフェノキシシクロトリホス ファゼン、(メタ)アクリロイルオキシメチルフェノキ シーペンタフェノキシシクロトリホスファゼン、ジ ((メタ)アクリロイルオキシメチルフェノキシ)-テ トラフェノキシシクロトリホスファゼン、トリ ((メ タ)アクリロイルオキシメチルフェノキシ)ートリフェ ノキシシクロトリホスファゼン、テトラ ((メタ) アク リロイルオキシメチルフェノキシ) -ジフェノキシシク ロトリホスファゼン及びペンタ((メタ)アクリロイル オキシメチルフェノキシ) -フェノキシシクロトリホス ファゼン等の(メタ)アクリロイルオキシメチルフェノ

ァゼン及びヘキサ (メタ) アクリロイルオキシメチルフ ェノキシシクロトリホスファゼン、(メタ) アクリロイ ルオキシエチルフェノキシーペンタフェノキシシクロト リホスファゼン、ジ((メタ)アクリロイルオキシエチ ルフェノキシ) -テトラフェノキシシクロトリホスファ ゼン、トリ((メタ)アクリロイルオキシエチルフェノ キシ) - トリフェノキシシクロトリホスファゼン、テト ラ((メタ)アクリロイルオキシエチルフェノキシ)-ジフェノキシシクロトリホスファゼン及びペンタ((メ タ)アクリロイルオキシエチルフェノキシ) -フェノキ シシクロトリホスファゼン等の(メタ)アクリロイルオ キシエチルフェノキシ基とフェノキシ基を混合置換した シクロトリホスファゼン及びヘキサ(メタ)アクリロイ ルオキシエチルフェノキシシクロトリホスファゼン、 (メタ) アクリロイルオキシブチルフェノキシーペンタ フェノキシシクロトリホスファゼン、ジ((メタ)アク リロイルオキシブチルフェノキシ) - テトラフェノキシ シクロトリホスファゼン、トリ((メタ)アクリロイル オキシブチルフェノキシ) - トリフェノキシシクロトリ チルフェノキシ) -ジフェノキシシクロトリホスファゼ ン及びペンタ((メタ)アクリロイルオキシブチルフェ ノキシ) -フェノキシシクロトリホスファゼン等の(メ タ) アクリロイルオキシブチルフェノキシ基とフェノキ シ基を混合置換したシクロトリホスファゼン及びヘキサ

リホスファゼン等を挙げられる。 【0029】また、(メタ)アクリロイルオキシエチル フェノキシ基とブトキシ基、オクチルオキシ基、トリフ シ基、アリルオキシ基、アリルフェノキシ基、クロルフ ェノキシ基及びトリフルオロメチルフェノキシ基より選 ばれる1種又は2種以上を混合置換したシクロトリホス ファゼン等を挙げられる。また、(メタ)アクリロイル オキシフェノキシ基とフェノキシ基を混合置換した、シ クロテトラホスファゼン、シクロペンタホスファゼン、 シクロヘキサホスファゼン、シクロホスファゼン混合物 (前記一般式(1)のnが3~15の混合物)、線状ホ スファゼン混合物(前記一般式(1)のnが平均3,0 40 00の混合物) 及び環状(=シクロ)及び線状ホスファ ゼン混合物(前記一般式(1)のnが平均1,000の 混合物) 等を挙げられる。また、(メタ)アクリロイ ルオキシエチルフェノキシ基とフェノキシ基を混合置換 したシクロテトラホスファゼン、シクロペンタホスファ ゼン、シクロヘキサホスファゼン、シクロホスファゼン 混合物(前記一般式(1)のnが3~15の混合物)、 線状ホスファゼン混合物(前記一般式(1)のnが平均 3、000の混合物)及び環状(=シクロ)及び線状ホ スファゼン混合物(前記一般式(1)のnが平均1,0 キシ基とフェノキシ基を混合置換したシクロトリホスフ 50 00の混合物) 等を挙げることができる。この中で最

(メタ) アクリロイルオキシブチルフェノキシシクロト

も望ましいのは、前記一般式(1)のnが3~15のも のである。

【0030】次にb) 成分の可溶性ポリイミドについて 説明する。本発明の感光性樹脂組成物に用いられる可溶 性ポリイミドは、既にイミド化したものを用いる。従っ て、ポリアミド酸では、イミド化する必要が生じ、25 0℃以上の高温に長時間曝す必要があり、銅箔あるいは ポリイミド以外の部分が劣化することがあったが、本発 明においては、劣化が生じない。

【0031】本発明における、可溶性のポリイミドの製 10 法について説明する。ポリイミドは一般的に、有機溶媒 中ジアミンと酸二無水物と反応させてポリアミド酸とし た後で、脱水イミド化するか、溶媒中酸二無水物とジイ ソシアナートと反応することにより得られる。本発明に 用いられるポリアミド酸は、有機溶剤中ジアミンと酸二 無水物と反応させるととにより得られる。アルゴン、窒 素等の不活性雰囲気中において、ジアミンを有機溶媒中 に溶解あるいは、スラリー状に拡散させ、酸二無水物を 有機溶媒に溶解、スラリー状に拡散させた状態、あるい は固体の状態で添加する。

【0032】 この時の反応温度は、-20℃~90℃が 望ましい。反応時間は30分から24時間程度である。 ボリアミド酸の平均分子量は5000~100000 であることが望ましい。平均分子量が5000未満で は、できあがったポリイミド組成物の分子量も低くな り、そのポリイミド組成物をそのまま用いても樹脂が脆 くなる傾向にある。一方、1000000を越えるとポ リアミド酸ワニスの粘度が高くなりすぎ取扱いが難しく なる傾向にある。

【0033】また、このポリイミド組成物に各種の有機 添加剤、或は無機のフィラー類、或は各種の強化材を複 合することも可能である。とこで該ポリアミド酸の生成 反応に使用される有機極性溶媒としては、例えば、ジメ チルスルホキシド、ジエチルスルホキシドなどのスルホ キシド系溶媒、N、N-ジメチルホルムアミド、N、N -ジエチルホルムアミドなどのホルムアミド系溶媒、 N, N-ジメチルアセトアミド、N, N-ジエチルアセ トアミドなどのアセトアミド系溶媒、N-メチル-2-ピロリドン、N-ビニル-2-ピロリドンなどのピロリ ドン系溶媒、フェノール、oー、mー、またはpークレ ゾール、キシレノール、ハロゲン化フェノール、カテコ ールなどのフェノール系溶媒、テトラヒドロフラン、ジ オキサン等のエーテル系溶媒、メタノール、エタノー ル、プタノール等のアルコール系溶媒、ブチルセロソル ブ等のセロソルブ系あるいはヘキサメチルホスホルアミ ド、アープチロラクトンなどをあげることができ、これ らを単独または混合物として用いるのが望ましいが、更 にはキシレン、トルエンのような芳香族炭化水素も使用 可能である。溶媒は、ポリアミド酸を溶解するものであ れば特に限定されない。次に、ポリアミド酸をイミド化 50 二無水物、1,4,5,8-ナフタレンテトラカルボン

する工程について説明する。ポリアミド酸が、イミド化 する際に、水を生成する。との生成した水は、ポリアミ ド酸を容易に加水分解し分子量の低下を引き起こす。こ の水を除去しながらイミド化する方法として、通常1) トルエン・キシレン等の共沸溶媒を加え共沸により除去 する方法、2)無水酢酸等の脂肪族酸二無水物とトリエ チルアミン・ピリジン・ピコリン・イソキノリン等の3 級アミンを加える化学的イミド化法等が一般的である。 【0034】別の方法として、イミド化により生成する 水を加熱・減圧し、積極的に系外に除去することにより 加水分解を抑え、分子量低下を避けることができる。ま た、用いた原料の酸二無水物中に、加水分解により開環 したテトラカルボン酸或いは、酸二無水物の片方が加水 開環したもの等が混入し、ポリアミド酸の重合反応を停 止した場合、イミド化時の減圧・加熱により、開環した 酸二無水物が再び、閉環して酸二無水物となり、イミド 化中に、系内に残っているアミンと反応し、分子量の向 上が期待できる。イミド化の加熱条件は、80~400 ℃である。イミド化効率よく行われ、しかも水が効率よ く除かれる100℃以上、望ましくは120℃以上であ る。最髙温度は、用いるポリイミドの熱分解温度以下に 設定することが望ましく、通常、250~350℃程度 でイミド化は、ほぼ完了するため、最高温度をこの程度 にすることもできる。減圧する圧力の条件は、圧力が小 さいほうが好ましいが、上記加熱条件で、イミド化時に 生成する水が効率よく除去される圧力であればよい。具 体的には、減圧加熱する圧力は0.9~0.001気圧 であり、望ましくは、0.8~0.001気圧、さらに 望ましくは、0.7~0.01気圧である。このポリイ ミド組成物に用いられる酸二無水物は、酸二無水物であ れば特に限定されないが、例えば2、2~-ヘキサフル オロプロピリデンジフタル酸二無水物、2、2-ビス (4-ヒドロキシフェニル) プロパンジベンゾエートー 3, 3 , 4, 4 - テトラカルボン酸二無水物、ブタ ンテトラカルボン酸二無水物、1、2、3、4-シクロ ブタンテトラカルボン酸二無水物、1,3-ジメチルー 1, 2, 3, 4-シクロブタンテトラカルボン酸、1, 2, 3, 4-シクロベンタンテトラカルボン酸二無水 物、2、3、5-トリカルボキシシクロペンチル酢酸二 無水物、3、5、6-トリカルボキシノルボナン-2-酢酸二無水物、2,3,4,5-テトラヒドロフランテ トラカルボン酸二無水物、5-(2,5-ジオキソテト ラヒドロフラル) -3-メチル-3-シクロヘキセン-1, 2-ジカルボン酸二無水物、ビシクロ[2,2, 2] -オクト-7-エン-2、3、5、6-テトラカル ボン酸二無水物等の脂肪族または脂環式テトラカルボン 酸二無水物;ピロメリット酸二無水物、3,31,4, 4'ーベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、3, 3 ', 4, 4' - ピフェニルスルホンテトラカルボン酸

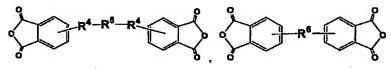
酸二無水物、2,3,6,7-ナフタレンテトラカルボ ン酸二無水物、3,3',4,4'-ビフェニルエーテ ルテトラカルボン酸二無水物、3,3',4,4'-ジ メチルジフェニルシランテトラカルボン酸二無水物。 3, 3', 4, 4'ーテトラフェニルシランテトラカル ボン酸二無水物、1,2,3,4-フランテトラカルボ ン酸二無水物、4,4 '-ビス(3,4-ジカルボキシ フェノキシ)ジフェニルスルフィド二無水物、4,4 '-ビス(3,4-ジカルボキシフェノキシ)ジフェニ ルスルホン二無水物、4, 4 'ービス(3, 4 - ジカル 10 エーテル結合を示し、R'は2価の有機基であり特に化 ボキシフェノキシ)ジフェニルプロパン二無水物、3, 3', 4, 4 '-パーフルオロイソプロピリデンジフタ ル酸二無水物、3,3',4,4 '-ビフェニルテトラ カルボン酸二無水物、ビス(フタル酸)フェニルホスフ ィンオキサイド二無水物、p-フェニレン-ビス(トリ フェニルフタル酸) 二無水物、m-フェニレン-ビス (トリフェニルフタル酸) 二無水物、ビス (トリフェニ*

*ルフタル酸)-4,4'-ジフェニルエーテル二無水 物、ビス(トリフェニルフタル酸)-4,4'-ジフェ ニルメタン二無水物等の芳香族テトラカルボン酸二無水 物等を挙げることができる。これらのテトラカルボン酸 二無水物は、単独でまたは2種以上組み合わせて用いる ととができる。

14

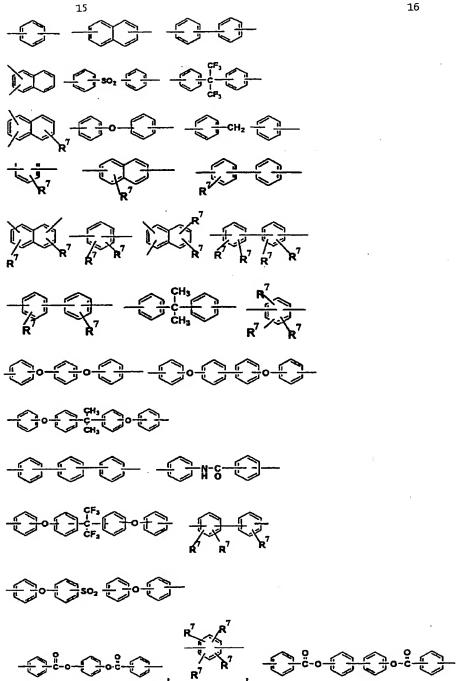
【0035】特に、耐熱性と機械特性を高次元で発現す るには、一般式(5):化13の構造の酸二無水物を用 いることが望ましい。(R・は、エステル結合あるいは 14で示される群から選択される構造が望ましく、R® は、直結・-O-・-CH₂-・- (C=O) -・-C $(CH_3)_2 - \cdot - C(CF_3)_2 - \cdot - SO_2 - ca$ る。)

[0036] 【化13】



一般式(5), [0037]

【化14】



(式中、R'は、水素・ハロゲン・メトキシ・C₁~C₁₆ のアルキル基を示す。) 有機溶媒への溶解性の高いポリ イミドを得るためには、一般式(5)中、2、2 '-へ キサフルオロプロピリデンジフタル酸二無水物、2, 3, 3', 4 '-ビフェニルテトラカルボン酸二無水 物、4、4-(4、4)-イソプロピリデンジフェノキ シ) ビスフタル酸無水物、2,2-ビス(4-ヒドロキ シフェニル)プロパンジベンゾエートー3,3 ',4, 4'ーテトラカルボン酸二無水物を一部用いることが望 50 ン酸を有する可溶性ポリイミドを得ることが得られアル

ましい。

【0038】感光性樹脂として、用いられる現像液は環 境に対する影響から、有機溶媒計から水溶液系特にアル カリ水溶液系になってきている。

【0039】アルカリ水溶液で現像できるように設計す るためには、可溶性ポリイミドの原料となるジアミン成 分として、COOH基或いはOHを分子内に2個有する ジアミンを用いる。このことにより水酸基或いはカルボ

カリ水溶液で現像できるようになる。前記カルボン酸を 2個有するジアミンとしては、カルボン酸を2個有して いれば特に限定されることはないが以下の様なものが例 示できる。

【0040】例えば、2,5-ジアミノテレフタル酸等 のジアミノフタル酸類、3,3 '-ジアミノ-4,4' ージカルボキシビフェニル、4,4 'ージアミノー3, 3'ージカルボキシビフェニル、4,4'ージアミノー 2, 2'-ジカルボキシビフェニル、4, 4'-ジアミ 等のカルボキシピフェニル化合物類、3,3'-ジアミ ノー4,4 '-ジカルボキシジフェニルメタン、2,2 -ビス[3-アミノー4-カルボキシフェニル]プロパ ン、2,2-ビス[4-アミノ-3-カルボキシフェニ ル]プロパン、2,2-ビス[3-アミノ-4-カルボキ シフェニル]ヘキサフルオロプロパン、4,4'-ジア ルメタン等のカルボキシジフェニルメタン等のカルボキ シジフェニルアルカン類、3,3 '-ジアミノ-4, アミノー3,3'ージカルボキシジフェニルエーテル 4, 4 '-ジアミノ-2, 2' -ジカルボキシジフェニ ルエーテル、4,4 '-ジアミノ-2,2',5,5 '-テトラカルボキシジフェニルエーテル等のカルボキ シジフェニルエーテル化合物、3,3'-ジアミノー 4. 4 '-ジカルボキシジフェニルスルフォン、4, 4'-ジアミノー3.3'-ジカルボキシジフェニルス ルフォン、4,4'ージアミノー2,2'ージカルボキ シジフェニルスルフォン、4,4'-ジアミノ-2,2 ', 5, 5' ーテトラカルボキシジフェニルスルフォン 等のジフェニルスルフォン化合物、2,2~ビス[4-(4-アミノ-3-カルボキシフェノキシ) フェニル] プロパン等のビス[(カルボキシフェニル)フェニル] アルカン化合物類、2,2-ビス[4-(4-アミノー 3-カルボキシフェノキシ)フェニル]スルフォン等の ビス[(カルボキシフェノキシ)フェニル]スルフォン化 合物をあげることができる。

【0041】また、前記水酸基を2個有するジアミンと しては、水酸基を2個有していれば特に限定されること はないが以下の様なものが例示できる。

【0042】例えば、4,6-ジアミノレゾルシノー ル、3、3 '-ジアミノ-4、4' -ジヒドロキシビフ ェニル、4,4 '-ジアミノ-3,3' -ジヒドロキシ ピフェニル、4,4 '-ジアミノ-2,2' -ジヒドロ キシビフェニル、4,4 '-ジアミノ-2,2',5、 5 '-テトラヒドロキシビフェニル等のヒドロキシビフ ェニル化合物類、3, 3'ージアミノー4, 4'ージヒ ドロキシジフェニルメタン、2,2-ビス[3-アミノ -4-ヒドロキシフェニル]プロパン、2,2-ビス[4] -アミノ-3-ヒドロキシフェニル]プロパン、2,2

-ビス[3-アミノ-4-ヒドロキシフェニル]ヘキサフ ルオロプロパン、4,4'ージアミノー2,2'、5. 5'-テトラヒドロキシジフェニルメタン等のヒドロキ シジフェニルメタン等のヒドロキシジフェニルアルカン・ 類、3,3 '-ジアミノ-4,4' -ジヒドロキシジフ ェニルエーテル、4,4 '-ジアミノ-3,3' -ジヒ ドロキシジフェニルエーテル、4,4 '-ジアミノー 2, 2'ージヒドロキシジフェニルエーテル、4, 4 **'ージアミノー2, 2', 5, 5'ーテトラヒドロキシ** ノー2,2',5,5 'ーテトラカルボキシビフェニル 10 ジフェニルエーテル等のヒドロキシジフェニルエーテル 化合物、3,3'-ジアミノ-4,4'-ジヒドロキシ ジフェニルスルフォン、4,4'ージアミノー3.3 'ージヒドロキシジフェニルスルフォン、4,4'-ジ アミノー2, 2 ージヒドロキシジフェニルスルフォ ン、4,4'ージアミノー2,2',5,5'ーテトラ ヒドロキシジフェニルスルフォン等のジフェニルスルフ ォン化合物、2,2-ビス[4-(4-アミノ-3-ヒ ドロキシフェノキシ)フェニル]プロパン等のビス [(ヒドロキシフェニル)フェニル]アルカン化合物 4'-ジカルボキシジフェニルエーテル、4,4'-ジ 20 類、2,2-ビス[4-(4-アミノ-3-ヒドロキシ フェノキシ) フェニル]スルフォン等のビス[(ヒドロキ シフェノキシ)フェニル]スルフォン化合物をあげると とができる。

> 【0043】また、別途水酸基やヒドロキシル基を1個 有するジアミンを用いることもできる。例えば、 例え ば、2,4-ジアミノフェノール等のジアミノフェノー ル類、3, 3 '-ジアミノ-4, 4' -ジヒドロキシビフェニル、4、4 '-ジアミノ-3、3' -ジヒドロキ シビフェニル、4,4 '-ジアミノ-2,2' -ジヒド 30 ロキシビフェニル、4,4 '-ジアミノ-2,2', 5,5 '-テトラヒドロキシビフェニル等のヒドロキシ ピフェニル化合物類、3,3'-ジアミノ-4,4'-ジヒドロキシジフェニルメタン、4,4'ージアミノー 3, 3 '-ジハイドロキシジフェニルメタン、4, 4' -ジアミノ-2, 2 '-ジハイドロキシジフェニルメタ ン、2、2ーピス[3ーアミノー4ーヒドロキシフェニ ル]プロパン、2、2-ビス[4-アミノ-3-ヒドロキ シフェニル]プロパン、2,2-ビス[3-アミノ-4-ヒドロキシフェニル]ヘキサフルオロプロパン、4, 40 4'-ジアミノ-2, 2', 5, 5'-テトラヒドロキ シジフェニルメタン等のヒドロキシジフェニルメタン等 のヒドロキシジフェニルアルカン類、3,3 '-ジアミ ノー4,4'ージヒドロキシジフェニルエーテル、4, 4 '-ジアミノ-3, 3' -ジヒドロキシジフェニルエ ーテル、4,4 '-ジアミノ-2,2' -ジヒドロキシ ジフェニルエーテル、4,4 '-ジアミノ-2,2', 5,5 '-テトラヒドロキシジフェニルエーテル等のヒ ドロキシジフェニルエーテル化合物、3,3'-ジアミ ノー4, 4 '-ジヒドロキシジフェニルスルフォン、 50 4, 4' -ジアミノ-3, 3 '-ジヒドロキシジフェニ

(11)

ルスルフォン、4、4'-ジアミノ-2、2 '-ジヒド ロキシジフェニルスルフォン、4,4'-ジアミノー 2.2 '.5.5' -テトラヒドロキシジフェニルスル フォン等のジフェニルスルフォン化合物、2、2-ビス [4-(4-アミノ-3-ヒドロキシフェノキシ)フェ ニル]プロパン等のビス[(ヒドロキシフェニル)フェ ニル]アルカン化合物類、4,4 '-ビス(4-アミノ -3-ヒドキシフェノキシ) ビフェニル等のビス (ヒド キシフェノキシ)ビフェニル化合物類、2、2-ビス [4-(4-アミノー3-ヒドロキシフェノキシ)フェ ニル]スルフォン等のビス[(ヒドロキシフェノキシ)フ ェニル]スルフォン化合物、3,5-ジアミノ安息香酸 等のジアミノ安息香酸類、4、4'ージアミノー3、3 'ージハイドロキシジフェニルメタン、4, 4'ージア ミノー2, 2 'ージハイドロキシジフェニルメタン、 2, 2-ビス[3-アミノ-4-ヒドロキシフェニル]プ ロパン、4、4 ービス(4ーアミノー3ーヒドキシフ ェノキシ) ピフェニル等のピス (ヒドキシフェノキシ) ピフェニル化合物類をあげることができる。

【0044】また、化15で表されるシロキサンジアミンを用いれば、柔軟性・溶解性の高い可溶性イミドが得られるため望ましい。(式中、R*は、C,~C,,のアルキル基或いはフェニル基、xは1~20の整数、yは1~40の整数を示す。)

[004.5]

【化15】

$$H_2N - \left(CH_2 - \frac{R^8}{Y}\right) + \frac{R^8}{R^8} - \left(CH_2 - \frac{R^8}{Y}\right) \times \left(CH_2 - \frac{R^8}{Y}\right) \times$$

式中、 R^* の好ましい例としてメチル基・エチル基・フェニル基をあげることができ、さらに好ましくはメチル基である。また $x=2\sim1$ 0 が好ましく、特に $2\sim5$ が好ましい。 $y=4\sim3$ 0 が好ましく、さらに好ましくは $5\sim2$ 0 、特に $8\sim1$ 5 が好ましい。このなかでy の値の範囲が物性に与える影響が大きく、y の値が小さいと、得られたポリイミドの可とう性が乏しくなり、また大きすぎるとポリイミド耐熱性が損なわれる傾向にある。

【0046】前記シロキサンジアミンは、全ジアミン成分中、 $5\sim70$ モル%用いることが好ましくは、さらには $10\sim50$ モル%用いることが好ましい。

【0047】その他にとのポリイミド組成物に用いられるジアミンは、ジアミンであれば特に限定されないが、例えば、p-フェニレンジアミン、m-フェニレンジアミン、4.4'ージアミノフェニルエタン、4.4'ージアミノフェニルエタン、4.4'ージアミノフェニルスルフィド、4.4'ージジアミノフェニルスルフォン、1.5 50

ージアミノナフタレン、3、3ージメチルー4、4'ー ジアミノビフェニル、5-アミノ-1-(4 '-アミノ フェニル)-1,3,3-トリメチルインダン、6-ア ミノー1-(4'-アミノフェニル)-1,3,3-ト リメチルインダン、4、4'ージアミノベンズアニリ ド、3、5 - ジアミノ - 3 ' - トリフルオロメチルベン ズアニリド、3、5-ジアミノ-4 '-トリフルオロメ チルベンズアニリド、3、4'-ジアミノジフェニルエ ーテル、2、7ージアミノフルオレン、2、2ーピス (4-アミノフェニル) ヘキサフルオロプロパン、4. 4 '-メチレン-ピス(2-クロロアニリン)、2. 2', 5, 5 '-テトラクロロ-4, 4' -ジアミノビ フェニル、2, 2 'ージクロロー4, 4' ージアミノー 5, 5 '-ジメトキシビフェニル、3, 3 '-ジメトキ シー4, 4' -ジアミノピフェニル、4, 4 '-ジアミ ノー2, 2'-ビス(トリフルオロメチル)ピフェニ ル、2、2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェ ニル] プロパン、2、2-ビス[4-(4-アミノフェ ノキシ) フェニル] ヘキサフルオロプロパン、1、4-20 ビス (4-アミノフェノキシ) ベンゼン、4,4 '-ビ ス(4-アミノフェノキシ)-ビフェニル、1,3'-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、9、9-ビス フェニレンイソプロピリデン) ビスアニリン、4、4 '- (m-フェニレンイソプロピリデン) ピスアニリ ン、2、2'ービス[4-(4-アミノ-2-トリフル オロメチルフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロ パン、4,4'ービス[4-(4-アミノ-2-トリフ ルオロメチル)フェノキシ]-オクタフルオロビフェニ 30 ル等の芳香族ジアミン;ジアミノテトラフェニルチオフ ェン等の芳香環に結合された2個のアミノ基と当該アミ ノ基の窒素原子以外のヘテロ原子を有する芳香族ジアミ ン:1,1-メタキシリレンジアミン、1,3-プロパ ンジアミン、テトラメチレンジアミン、ペンタメチレン ジアミン、オクタメチレンジアミン、ノナメチレンジア ミン、4、4-ジアミノヘプタメチレンジアミン、1. 4-ジアミノシクロヘキサン、イソフォロンジアミン、 テトラヒドロジシクロペンタジエニレンジアミン、ヘキ サヒドロー4、7-メタノインダニレンジメチレンジア ミン、トリシクロ[6, 2, 1, 0^{1.7}] - ウンデシレ ンジメチルジアミン、4、4 '-メチレンビス (シクロ ヘキシルアミン)等の脂肪族ジアミンおよび脂環式ジア ミン等を挙げることができる。これらのジアミン化合物 は単独でまたは2種以上組み合わせて用いることができ る。

【0048】芳香族ジアミンを用いる場合、m-位(3-) にアミノ基を持つジアミンを用いれば、g線・i線領域での可溶性イミド自体の光の吸収が小さくなる傾向にあり、感光性樹脂を設計する際に有利である。

【0049】本発明の可溶性ポリイミドのCOOH当量

(12)

30

は、300~3000であることがのぞましい。これ は、前述のカルボン酸を有するジアミンを可溶性ポリイ ミドの原料として用いることにより実現される。可溶性 ポリイミドの好ましいCOOH当量としては、350~ 2500、さらに好ましくは、350~2000であ る。カルボン酸当量が、3000を超えると、水溶液系 のアルカリ現像液に溶解しにくくなり、現像時間が長く なるため望ましくない。また、カルボン酸を2個以上含 有するジアミンを用いれば、300以下のカルボン酸当 量を実現可能であるが、溶解性の高い構造とするにはあ 10 い。 る程度分子量の大きなモノマーを用いる必要があり、3 00以下にすることは困難である。前述のカルボン酸当 量を実現するには、分子内に2個以上有するジアミンを 用いることが望ましい。このジアミンを用いることによ り、所定のカルボン酸当量を実現する際、別種のジアミ ンを共重合することが可能になり、物性の設計が容易に なるため望ましい。ポリアミド酸溶液を減圧下で加熱乾 燥して直接イミド化する具体的な方法について説明す る。減圧下、加熱乾燥できるなら方法は問わないが、バ ッチ式の方法として、真空オーブン、連続式の方法とし て、例えば減圧装置の付随した2軸或いは3軸押出し機 により実施できる。これらの方式は、生産量により選択 される。ととでいう減圧装置の付随した2軸或いは3軸 押出し機とは、熱可塑樹脂を加熱溶融押出しを行う、-般的な溶融押出し機に減圧して溶媒を除去する装置を付 随させたものである。2軸あるいは3軸の押出し機によ りポリアミド酸溶液が、押出し機により混練されながら 溶媒とイミド化時に生成した水を除去され、可溶性ポリ イミドとなる。

【0050】とのようにして、本発明のCOOH当量 が、300~3000の可溶性ポリイミドを得ることが できる。COOHの影響で、アルカリ水溶液に可能な樹 脂組成物を提供することができる。

【0051】また、COOHとエポキシ基を反応させる と例えば、COO-CH,-CH(OH)-の様に、エ ステル結合と2級水酸基が生成する。このエステル結合 と2級水酸基を持つ化合物は、現像時に金属イオンを取 り込みにくく、電気特性を落とさない。加えて、アルカ リ水溶液にて現像できることを見出した。よって、可溶 性ポリイミドのCOOHをエポキシ基と反応させること 40 が望ましい。

【0052】本発明は、COOH当量300~3000 の可溶性ポリイミドをエポキシ基を有する化合物で変成 し、エポキシ変成ポリイミドとすることが望ましい。エ ポキシ変成ポリイミドの原料となる可溶性ポリイミドの 好ましいCOOH当量としては、350~2500、さ らに好ましくは、350~2000である。カルボン酸 当量が、3000を超えると、水溶液系のアルカリ現像 液に溶解しにくくなり、現像時間が長くなるため望まし

を用いれば、300以下のカルボン酸当量を実現可能で あるが、溶解性の高い構造とするにはある程度分子量の 大きなモノマーを用いる必要があり、300以下にする ことは困難である。

【0053】前述のカルボン酸当量を実現するには、前 述の分子内に2個以上有するジアミンを用いることが望 ましい。このジアミンを用いることにより、所定のカル ボン酸当量を実現する際、別種のジアミンを共重合する ことが可能になり、物性の設計が容易になるため望まし

【0054】次にエポキシ変性ポリイミドの製造方法に ついて説明する。前述のカルボキシル基を有する可溶性 ポリイミドを有機溶媒に溶かし、エポキシ化合物と水酸 基またはカルボキシル基を有するポリイミドとを反応さ せることによりエポキシ変性ポリイミドが得られる。こ のエポキシ変性ポリイミドは熱可塑性を示すものが好ま しく、350°C以下のガラス転移温度(Tg)が好まし 64.

【0055】反応に用いられる溶媒は、エポキシ基とは 反応せず、水酸基またはカルボキシル基を有するポリイ ミドを溶解するものであれば特に限定されない。例え ば、ジメチルスルホキシド、ジエチルスルホキシドなど のスルホキシド系溶媒、N、N-ジメチルホルムアミ ド、N、Nージエチルホルムアミドなどのホルムアミド 系溶媒、N, N-ジメチルアセトアミド、N, N-ジエ チルアセトアミドなどのアセトアミド系溶媒、N-メチ ル-2-ピロリドン、N-ビニル-2-ピロリドンなど のピロリドン系溶媒、テトラヒドロフラン、ジオキサン 等のエーテル系溶媒、メタノール、エタノール、ブタノ ール等のアルコール系溶媒、ブチルセロソルブ等のセロ ソルブ系あるいはヘキサメチルホスホルアミド、ァーブ チロラクトン等、更にはキシレン、トルエンのような芳 香族炭化水素も使用可能である。これらを単独または混 合物として使用するととができる。本発明のエポキシ変 性ポリイミドは最終的には溶媒が除去して用いられる場 合が殆どであるので、なるべく沸点の低いものを選択す ることも重要である。

【0056】ととで、水酸基またはカルボキシル基を有 するポリイミドと反応させるエポキシ化合物について説 明する。好ましいエポキシ化合物としては、エポキシ基 を2個以上有するエポキシ化合物やエポキシ基と炭素間 2重結合或いは炭素間3重結合を有する化合物が挙げら

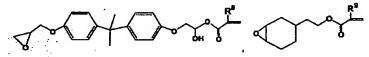
【0057】エポキシ基を2個以上有するエポキシ化合 物とは、エポキシ基を分子内に2個以上持っている化合 物をいい次のように例示できる。例えば、エピコート8 28 (油化シェル社製)等のビスフェノール樹脂、18 0S65 (油化シェル社製)等のオルソクレゾールノボ ラック樹脂、157570 (油化シェル社製) 等のビス くない。また、カルボン酸を2個以上含有するジアミン(50)フェノールAノボラック樹脂、1032H60(油化シ

ェル社製) 等のトリスヒドロキシフェニルメタンノボラ ック樹脂、ESN375等のナフタレンアラルキルノボ ラック樹脂、テトラフェニロールエタン1031S(油 化シェル社製)、YGD414S(東都化成)、トリス ヒドロキシフェニルメタンEPPN502H(日本化 薬)、特殊ピスフェノールVG3101L(三井化 学)、特殊ナフトールNC7000(日本化薬)、TE TRAD-X、TETRAD-C (三菱瓦斯化学社製) 等のグリシジルアミン型樹脂などがあげられる。

*【0058】エポキシ基と炭素間2重結合を有する化合 物とは、エポキシ基と炭素間2重結合を分子内に持って いれば特に限定されないが、以下のように例示すること ができる。即ちアリルグリシジルエーテル・グリシジル アクリレート・グリシジルメタクレート・グリシジルビ ニルエーテルや化16等である。(但し、R'は、水素 或いはメチル基を示す。)

[0059]

[ft16]



エポキシ基と炭素間3重結合を有する化合物とは、エポ キシ基と炭素間3重結合を分子内に持っていれば特に限 定されないが、以下のように例示することができる。即 ちプロパギルグリシジルエーテル・グリシジルプロピオ レート・エチニルグリシジルエーテル等である。

【0060】これらのエポキシ化合物及び水酸基または カルボキシル基を有するポリイミドとを反応させるため 20 には、これらを有機溶媒に溶解し加熱により反応させ る。任意の溶解方法で良いが、反応温度は40℃以上1 30℃以下が好ましい。特に炭素間2重結合や炭素間3 重結合を有するエポキシ化合物については、炭素間2重 結合・炭素間3重結合が熱により分解或いは架橋しない 程度の温度で反応させることが好ましく、具体的には4 0℃以上100℃以下、さらに好ましくは50℃以上9 0℃以下である。反応時間は数分程度から8時間程度で ある。このようにして、エポキシ変性ポリイミドの溶液 を得ることができる。なお、このエポキシ変性ポリイミ 30 一般式 (β) ド溶液には、ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタ ン、ポリカーボネート等の熱可塑性樹脂を混合して用い てもよいし、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ビスマレイ ミド、ピスアリルナジイミド、フェノール樹脂、シアナ ート樹脂等の熱硬化性樹脂を混合して用いてもよい。ま た、種々のカップリング剤を混合してもよい。

【0061】本発明のエポキシ変性ポリイミドに、エポ キシ樹脂用として通常用いられる硬化剤を配合すると良 好な物性の硬化物が得られることがある。この傾向は、 水酸基またはカルボキシル基を有するポリイミドにエポ 40 キシ基を2個以上有するエポキシ化合物を反応させて得 たエポキシ変性ポリイミドにおいて特に顕著である。と の場合のエポキシ樹脂用の硬化剤としてはアミン系・イ・ ミダゾール系・酸無水物系・酸系等が代表例として示さ れる。

【0062】本発明の感光性樹脂組成物においては、感 光性を付与するために、光反応開始剤を配合する。光反 応開始剤として、光によりg線程度の長波長の光により ラジカルを発生する化合物の一例として、下記一般式 (α·β)で表されるアシルフォスフィンオキシド化合 50 メチルアミノベンジリデン)-N-メチル-4-ピベリ

物が挙げられる。 これにより発生したラジカルは、2結 合を有する反応基(ピニル・アクロイル・メタクロイル アリル等)と反応し架橋を促進する。

[0063]

【化17】

一般式(α)

[0064]

[化18]

(式中、R*, R12及びR14は、C,H,-, C,H,(C H_{1}) -, $C_{6}H_{2}$ (CH_{1}),-, (CH_{1}),C-, $C_{6}H$,Cl,-を、R¹⁰, R¹¹及びR¹³C₆H₅-, メトキシ, エトキシ、 $C_6H_*(CH_*)$ -、 $C_6H_*(CH_*)$ 」ーを 表す。)

特に一般式(β)で表されるアシルフォスフィンオキシ ドは、α開裂により、4個のラジカルを発生するため好 ましい。(一般式(α)は、2個のラジカルを発生) ラジカル開始剤として種々のパーオキサイドを下記の増 感剤と組み合わせて用いるととができる。特に3,

3', 4, 4'-テトラ(t-ブチルパーオキシカルボ ニル) ベンゾフェノンと増感剤との組み合わせが特に好 ましい本発明で用いられる感光性樹脂組成物うる感光感 度を達成するため、増感剤を含むことができる。増感剤 の好ましい例としては、ミヒラケトン、ビスー4、4 '-ジエチルアミノベンゾフェノン、ベンゾフェノン、 カンファーキノン、ベンジル、4,4'ージメチルアミ ノベンジル、3,5-ビス(ジェチルアミノベンジリデ

ン) -N-メチル-4-ピペリドン、3,5-ピス(ジ

ドン、3、5-ビス(ジエチルアミノベンジリデン)-N-エチル-4-ピペリドン、3,3'-カルボニルビ ス(7-ジエチルアミノ)クマリン、リボフラビンテト ラブチレート、2-メチル-1-[4-(メチルチオ) フェニル]-2-モルフォリノプロパン-1-オン、 2, 4-ジメチルチオキサントン、2, 4-ジェチルチ オキサントン、2、4-ジイソプロピルチオキサント ン、3,5-ジメチルチオキサントン、3,5-ジイソ プロビルチオキサントン、1-フェニル-2-(エトキ シカルボニル) オキシイミノプロパン-1-オン、ベン ゾインエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベ ンズアントロン、5-ニトロアセナフテン、2-ニトロ フルオレン、アントロン、1,2-ベンズアントラキノ ン、1-フェニル-5-メルカプト-1H-テトラゾー ル、チオキサンテン-9-オン、10-チオキサンテノ ン、3-アセチルインドール、2,6-ジ(p-ジメチ ルアミノベンザル) - 4 - カルボキシシクロヘキサノ ン、2, 6-ジ (p-ジメチルアミノベンザル) -4-ヒドロキシシクロヘキサノン、2,6-ジ(p-ジエチ ルアミノベンザル)-4-カルボキシシクロヘキサノ ン、2, 6 -ジ(p - ジエチルアミノベンザル)- 4 -ヒドロキシシクロヘキサノン、4,6-ジメチル-7-エチルアミノクマリン、7-ジエチルアミノ-4-メチ ルクマリン、7-ジエチルアミノ-3-(1-メチルベ ンゾイミダゾリル) クマリン、3-(2-ベンゾイミダ ゾリル) -7-ジエチルアミノクマリン、3-(2-ベ ンゾチアゾリル) -7-ジエチルアミノクマリン、2-(p-ジメチルアミノスチリル) ベンゾオキサゾール 2-(p-ジメチルアミノスチリル) キノリン、4-(p-ジメチルアミノスチリル) キノリン、2-(p-ジメチルアミノスチリル) ゼンゾチアゾール、2-(p -ジメチルアミノスチリル)-3,3-ジメチル-3H -インドール等が挙げられるが、これらに限定されな 63.

【0065】増感剤は、本発明のポリイミド樹脂100重量部に対し、0.1~50重量部配合すること好ましく、0.3~20重量部とすることが、さらに好ましい。0.1~50重量部の範囲を逸脱すると、増感効果が得られなかったり、現像性に好ましくない影響を及ぼすことがある。なお、増感剤として、1種類の化合物を用いても良いし、数種を混合して用いてもよい。

アミノベンゾニトリル、エチレングリコールジチオグリ コレート、エチレングリコールジ(3-メルカプトプロ ビオネート)、トリメチロールプロパンチオグリコレー ト、トリメチロールプロパントリ(3-メルカプトプロ ピオネート)、ペンタエリスリトールテトラチオグリコ レート、ペンタエリスリトールテトラ(3-メルカプト プロピオネート)、トリメチロールエタントリチオグリ コレート、トリメチロールプロパントリチオグリコレー ト、トリメチロールエタントリ(3-メルカプトプロピ 10 オネート)、ジペンタエリスリトールヘキサ(3-メル カプトプロピオネート)、チオグリコール酸、α-メル カプトプロピオン酸、t-ブチルベルオキシベンゾエー ト、t ープチルペルオキシメトキシペンゾエート、t-ブチルペルオキシニトロベンゾエート、t-ブチルペル オキシエチルベンゾエート、フェニルイソプロビルベル オキシベンゾエート、ジtーブチルジペルオキシイソフ タレート、トリt-ブチルトリペルオキシトリメリテー ト、トリt-ブチルトリペルオキシトリメシテート、テ トラt-ブチルテトラベルオキシピロメリテート、2. 20 5-ジメチル-2, 5-ジ (ベンゾイルベルオキシ) へ キサン、3,3 ',4,4' -テトラ (t-ブチルペル オキシカルボニル) ペンゾフェノン、3、3、4、4 '‐テトラ(t‐アミルペルオキシカルボニル)ベンゾ フェノン、3, 3', 4, 4' - テトラ (t- ヘキシル ペルオキシカルボニル) ベンゾフェノン、2,6-ジ (p-アジドベンザル) - 4-ヒドロキシシクロヘキサノ ン、2,6-ジ(p-アジドベンザル)-4-カルボキシ シクロヘキサノン、2,6-ジ(p-アジドベンザル) -4-メトキシシクロヘキサノン、2,6-ジ(p-ア 30 ジドベンザル) -4-ヒドロキシメチルシクロヘキサノ ン、3, 5-ジ(p-rジドベンザル)-1-メチルー4 - ビベリドン、3, 5 - ジ(p-アジドベンザル) - 4ーピペリドン、3,5-ジ(p-アジベンザル)-N-ア セチルー4ーピペリドン、3,5-ジ(p-アジドベンザ ル) -N-メトキシカルボニルー4-ピペリドン、2.6 ージ (p-アジドベンザル) -4-ヒドロキシシクロヘキ サノン、2,6-ジ(m-アジドベンザル)-4-カルボ キシシクロヘキサノン、2,6-ジ(m-アジドベンザ ル) -4-メトキシシクロヘキサノン、2.6-ジ(m-40 アジドベンザル) -4-ヒドロキシメチルシクロヘキサ ノン、3,5-ジ(m-アジドベンザル)-N-メチル-4-ピペリドン、3、5-ジ (m-アジドベンザル)-4 -ピペリドン、3,5-ジ(m-アジドベンザル)-N-アセチルー4-ピペリドン、3,5-ジ (m-アジドベン ザル)-N-メトキシカルボニル-4-ピペリドン、2. 6-ジ(p-アジドシンナミリデン)-4-ヒドロキシシ クロヘキサノン、2,6-ジ(p-アジドシンナミリデ ン) -4-カルボキシシクロヘキサノン、2, 6-ジ(p -アジドシンナミリデン)-4-シクロヘキサノン、

-4-ピペリドン、4,4 '-ジアジドカルコン、3, 3 'ージアジドカルコン、3, 4' ージアジドカルコ ン、4、3 '-ジアジドカルコン、1、3-ジフェニル ル) オキシム、*1, 3 -シフェニル-1, 2, 3 - プロ パントリオン-2-(o-n-プロピルカルボニル)オ キシム、1、3-ジフェニル-1、2、3-プロパント リオン-2-(0-メトキシカルボニル)オキシム、 1, 3-ジフェニルー1, 2, 3-プロパントリオンー フェニルー1,2,3ープロパントリオンー2ー(0-ベンソイル) オキシム、1, 3-ジフェニルー1,2, 3-プロパントリオン-2-(0-フェニルオキシカル ボニル) オキシム、1, 3- ピス (p-メチルフェニル) -1, 2, 3-プロパントリオン-2-(o-ベンゾイ ル) オキシム、1, 3-ビス (p-メトキシフェニル) -1, 2, 3 - プロパントリオン-2-(o-エトキシカ ルボニル) オキシム、1-(p-メトキシフェニル)-3-(p-ニトロフェニル)-1,2,3-プロパント リオン-2-(0-フェニルオキシカルボニル)オキシ 20 ム等を用いることができるが、これらに限定されない。 また、別の助剤として、トリエチルアミン・トリプチル アミン・トリエタノールアミン等のトリアルキルアミン 類を混合することもできる。

【0067』光重合助剤は、可溶性ポリイミド100重 量部に対し、0.1~50重量部配合されることが好ま しく、0.3~20重量部の範囲がさらに好ましい。 0.1~50重量部の範瀦を逸脱すると、目的とする増 ・感効果が得られなかったり、現像性に好ましくない影響 をおよぼすことがある。なお、光重合助剤として1種類 の化合物を用いてもよいし、数種を混合してもよい。

【0068】また、本発明で用いられる感光性樹脂組成 物は、実用に供しうる感光感度を達成するため、上述の 増感剤・光重合助剤に加えて、さらに共重合モノマーを 含んでもよい。共重合モノマーは、炭素-炭素二重結合 を有する化合物であり、光重合を容易にする。共重合モ ノマーとしては、ビスフェノールF EO変性 (n=2 ~50) ジアクリレート、ビスフェノールA EO変性 O変性 $(n=2\sim50)$ ジアクリレート、1. $6-\alpha+4$ ンジオールジアクリレート、ネオペンチルグリコールジ アクリレート、エチレングリコールジアクリレート、ペ ンタエリスリトールジアクリレート、トリメチロールプ ロパントリアクリレート、ペンタエリスリトールトリア クリレート、ジベンタエリスリトールヘキサアクリレー ト、テトラメチロールプロパンテトラアクリレート、テ トラエチレングリコールジアクリレート、1,6-ヘキサ ンジオールジメタクリレート、ネオペンチルグリコール ジメタクリレート、エチレングリコールジメタクリレー ト、ペンタエリスリトールジメタクリレート、トリメチ 50 シ・ボリエトキシ)フェニル]プロパン、2.2-ビス

ロールプロパントリメタクリレート、ペンタエリスリト ールトリメタクリレート、ジペンタエリスリトールヘキ サメタクリレート、テトラメチロールプロパンテトラメ タクリレート、テトラエチレングリコールジメタクリレ ート、メトキシジエチレングリコールメタクリレート、 メトキシポリエチレングリコールメタクリレート、β-メタクロイルオキシエチルハイドロジェンフタレート、 β-メタクロイルオキシエチルハイドロジェンサクシネ ード、3-クロロ-2-ヒドロキシプロピルメタクレー ト、ステアリルメタクレート、フェノキシエチルアクリ レート、フェノキシジエチレングリコールアクリレー ト、フェノキシポリエチレングリコールアクリレート、 β-アクリロイルオキシエチルハイドロジェンサクシネ ート、ラウリルアクリレート、エチレングリコールジメ タクリレート、ジエチレングリコールジメタクレート、 トリエチレングリコールジメタクレート、ポリエチレン グリコールジメタクレート、1、3-ブチレングリコー ルジメタクレート、1.6-ヘキサンジオールジメタク レート、ネオペンチルグリコールジメタクレート、ポリ プロピレングリコールジメタクレート、2-ヒドロキシ 1, 3ジメタクロキシプロパン、2, 2-ビス[4-(メタクロキシエトキシ) フェニル]プロパン、2, 2 -ビス[4-(メタクロキシ・ジエトキシ)フェニル]プ ロパン、2、2-ビス「4-(メタクロキシ・ポリエト キシ)フェニル]プロパン、ポリエチレングリコールジ クリレート、トリプロピレングリコールジアクリレー ト、ポリプロピレングリコールジアクリレート、2,2 ービス「4-(アクリロキシ・ジエトキシ)フェニル]プ ロパン、2,2-ビス[4-(アクリロキシ・ポリエト キシ)フェニル]プロパン、2-ヒドロキシ1-アクリ ロキシ3-メタクロキシプロパン、トリメチロールプロ パントリメタクレート、テトラメチロールメタントリア クリレート、テトラメチロールメタンテトラアクリレー ト、メトキシジプロピレングリコールメタクレート、メ トキシトリエチレングリコールアクリレート、ノニルフ ェノキシポリエチレングリコールアクリレート、ノニル フェノキシボリプロピレングリコールアクリレート、1 -アクリロイルオキシプロビル-2-フタレート、イソ ステアリルアクリレート、ポリオキシエチレンアルキル エーテルアクリレート、ノニルフェノキシエチレングリ コールアクリレート、ポリプロピレングリコールジメタ クレート、1、4-ブタンジオールジメタクレート、3 ーメチルー1,5-ペンタンジオールジメタクレート、 1,6-メキサンジオールジメタクレート、1,9-ノ ナンジオールメタクレート、2、4-ジエチルー1、5

-ペンタンジオールジメタクレート、1,4-シクロへ

キサンジメタノールジメタクレート、ジプロピレングリ

コールジアクリレート、トリシクロデカンジメタノール

ジアクリレート、2,2-水添ビス[4-(アクリロキ

[4-(アクリロキシ・ボリプロボキシ)フェニル]プロ パン、2,4-ジエチル-1,5-ペンタンジオールジ アクリレート、エトキシ化トチメチロールプロパントリ アクリレート、プロポキシ化トチメチロールプロパント リアクリレート、イソシアヌル酸トリ(エタンアクリレ ート)、ペンタスリトールテトラアクリレート、エトキ シ化ペンタスリトールテトラアクリレート、プロポキシ 化ペンタスリトールテトラアクリレート、ジトリメチロ ールプロパンテトレアクリレート、ジベンタエリスリト ールポリアクリレート、イソシアヌル酸トリアリル、グ 10 フェニロールエタン1031S(油化シェル社製)、Y リシジルメタクレート、グリシジルアリルエーテル、 1, 3, 5-トリアクリロイルヘキサヒドローs-トリ アジン、トリアリル1、3、5-ベンゼンカルボキシレ ート、トリアリルアミン、トリアリルシトレート、トリ アリルフォスフェート、アロバービタル、ジアリルアミ ン、ジアリルジメチルシラン、ジアリルジスルフィド、 ジアリルエーテル、ザリルシアルレート、ジアリルイソ フタレート、ジアリルテレフタレート、1,3-ジアリ ロキシー2ープロパノール、ジアリルスルフィドジアリ ルジメタクレート、4,4 '- イソプロピリデンジフェ ノールジアクリレート等が好ましいが、これらに限定さ れない。架橋密度を向上するためには、特に2官能以上 のモノマーを用いることが望ましい。

【0069】また、本発明の感光性樹脂組成物から得ら れる硬化後の感光性ドライフィルムレジストの柔軟性を 発現することができるという点から、共重合モノマーと そして、ピスフェノールF EO変性ジアクリレート・ ビスフェノールA E〇変性ジアクリレート・ビスフェ ノールS EO変性ジアクリレート・ビスフェノールF EO変性シメタアクリレート・ビスフェノールA E O変性ジメタアクリレート・ビスフェノールS EO変 性ジメタアクリレートを用いるのが好ましい。特に、ジ アクリレートあるいはメタアクリレートの一分子中に含 まれる変成するEOの繰り返し単位が、2~50の範囲 のものが好ましく、さらに好ましくは~40である。E 〇の繰り返し単位により、アルカリ水溶液への溶解性が 向上し、現像時間が短縮される。50以上大きいと、耐 熱性が悪くなる傾向にあり好ましくない。

リイミド100重量部に対し、1~200重量部配合す ることが好ましく、3~150重量部の範囲がさらに好 ましい。1~200重量部の範囲を逸脱すると、目的と する効果が得られなかったり、現像性に好ましくない影 響をおよぼすことがある。なお、共重合モノマーとし て、1種類の化合物を用いても良いし、数種を混合して 用いてもよい。

【0071】また、本発明の感光性樹脂組成物の接着性 を向上させるために、エポキシ樹脂を含有してもい。エ に限定されないが、以下のように例示することができ る。

【0072】例えば、エピコート828 (油化シェル社 製)等のビスフェノール樹脂、180S65(油化シェ ル社製)等のオルソクレゾールノボラック樹脂、157 S70 (油化シェル社製)等のビスフェノールAノボラ ック樹脂、1032H60 (油化シェル社製) 等のトリ スヒドロキシフェニルメタンノボラック樹脂、ESN3 75等のナフタレンアラルキルノボラック樹脂、テトラ GD414S(東都化成)、トリスヒドロキシフェニル メタンEPPN502H (日本化薬)、特殊ビスフェノ ールVG3101L (三井化学)、特殊ナフトールNC 7000 (日本化薬)、TETRAD-X、TETRA D-C (三菱瓦斯化学社製)等のグリシジルアミン型樹 脂などがあげられる。

【0073】また、エポキシ基と2重結合・3重結合を 分子内に持っている化合物も混合することができる。例 えば、アリルグリシジルエーテル・グリシジルアクリレ ルマレエート、4、4 '- イソプロピリデンジフェノー 20 ート・グリシジルメタクレート・グリシジルビニルエー テル・プロバギルグリシジルエーテル・グリシジルプロ ピオレート・エチニルグリシジルエーテル等を例示する ことができる。

> 【0074】とのようにして、感光樹脂組成物の溶液を 得ることができる。このエポキシ変性ポリイミド溶液 に、適宜、エポキシ樹脂、アクリル樹脂等の熱硬化性樹 脂や、ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン、ポリ カーボネート等の熱可塑性樹脂を混ぜてもよい。

【0075】また、エポキシ樹脂以外の熱硬化性樹脂と 混合しても良好な物性が得られるためこのましい。ここ で用いられる熱硬化性樹脂としては、ビスマレイミド・ ビスアリルナジイミド・フェノール樹脂・シアナート樹 脂等があげられる。本発明の感光性樹脂組成物と、通常 エポキシ樹脂の硬化剤と混合すれば、よい物性の硬化物 が得られるため望ましい。エポキシ樹脂の硬化剤であれ は、アミン系・イミダゾール系・酸無水物系・酸系どの ような系を用いてもよい。また、種々のカップリング剤 を混合してもよい。

【0076】本発明で用いられる感光性組成物は、適当 【0070】との共重合モノマーは、本発明の可溶性ポ 40 な有機溶媒を含んでいてもよい。適当な有機溶媒に溶解 した状態であれば、溶液(ワニス)状態で使用に供する ことができ、塗布乾燥する際便利である。この場合に用 いる溶媒としては、溶解性の観点から非プロトン性極性 溶媒が望ましく、具体的には、N-メチル-2-ピロリド ン、N-アセチル-2-ピロリドン、N-ベンジル-2-ピ ロリドン、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチ ルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、ヘキサメチル ボスホルトリアミド、N-アセチル-ε-カプロラクタ ム、ジメチルイミダゾリジノン、ジエチレングリコール ボキシ樹脂とは、エボキシ基を分子内にもっていれば特 50 ジメチルエーテル、トリエチレングリコールジメチルエ

ーテル、ャーブチロラクトン、ジオキサン、ジオキソラン、テトラヒドロフラン、クロロホルム、塩化メチレンなどが好適な例としてあげられる。これらは単独で用いても良いし、混合系として用いることも可能である。この有機溶媒は、ボリイミドの合成反応で用いた溶媒をそのまま残留させたものでもよく、単離後の可溶性ボリイミドに新たに添加したものでもよい。また、塗布性を改善するために、トルエン、キシレン、ジエチルケトン、メトキシベンゼン、シクロベンタノン等の溶媒をボリマーの溶解性に悪影響を及ぼさない範囲で混合しても10差し支えない。

【0077】2、2 '-ヘキサフルオロブロビリデンジフタル酸二無水物、2、3、3'、4'ービフェニルテトラカルボン酸二無水物や前述の一般式(5)で表される酸二無水物を酸二無水物の主成分として用い、m-位にアミノ基を有する芳香族ジアミンやスルフォン基を有するジアミン・前述の化15で表されるシロキサンジアミンをジアミン成分の一部に用いることにより、得られた可溶性ポリミドの溶解性は飛躍的に向上し、ジオキサン・ジオキソラン・テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒、クロロホルム・塩化メチレンのハロゲン系溶媒等の沸点120℃以下の低沸点溶媒に溶解することができる。特に感光性樹脂組成物を塗布乾燥する際、120℃以下の低沸点溶媒を用いれば、混合するアクリルまたは/あるいはメタアクリルの熱重合を防ぐことができるため有利である。

【0078】このようにして得られた感光性樹脂組成物 の溶液を乾燥させてフィルム状の感光性ドライフィルム レジストとする。との際、金属やPET等の支持体の上 に塗布し、乾燥乾燥後、支持体より剥がして単独のフィ ルムとして取り扱ってもいし、PET名等のフィルムの 上に積層されたままの状態で用いられることもできる。 この感光性樹脂組成物の乾燥温度は、熱によりエポキシ 或いは、2重結合・3重結合がつぶれてしまわない温度 で行うことが望ましく、具体的には180℃以下好まし くは、150℃以下である。とのようにして得られた感 光性ドライフィルムレジストの使用法の一例について説 明する。通常、FPCの工程は、長尺のフィルムに接着 剤塗布・乾燥・銅箔と連続ラミネートされ、生産性がよ い。しかし、従来の技術でも述べたが、貼り合わせる前 の感光性カバーレイフィルムに回路の端子部や部品との 接合部に一致する穴や窓を開ける加工をし、カバーレイ フィルムの穴等を、FPCの端子部や部品との接合部に 合わせる位置合わせはほとんど手作業に近く、しかも小 さなワークサイズでバッチで張り合わせるため作業性及 び位置精度が悪くまたコストもかかるものであった。

【0079】本発明における感光性ドライフィルムレジ またはアンモニウムイオンの、ホ酸化物または炭酸塩 ストは、150℃以下の温度でラミネートでき、接着剤 や、アミン化合物などが挙げられ、具体的には、2一ジ を介さずに直接にプリント基板に積層することが可能で メチルアミノエタノール、3-ジメチルアミノー1-プロ ある。このラミネート温度は、低いほうが好ましく、好 50 パノール、4-ジメチルアミノー1-ブタノール、5-ジ

ましくは130℃以下、更に好ましくは110℃以下である。また、本発明の感光性ドライフィルムレジストは、FPCと感光性ドライフィルムレイジストを貼り合わせてから、露光・現像することにより、FPC端子部と接合するための穴をあけることができ、位置精度・作業性の問題を改善することができる。FPCは、半田で接合する際に200℃以上の高温に数秒曝し接合する。よって、硬化後の感光性ドライフィルムレジストの耐熱温度が高いほうが好ましく、硬化後の感光性ドライフィルムレジスト単独の熱分解温度は、300℃以上であり、好ましくは、320℃以上、更に好ましくは340℃以上である。

【0080】FPCの導体層には、主に銅が用いられる。200℃を超える温度に、銅を曝せば、徐々に銅の結晶構造が変化し、強度が低下する。よって、硬化温度を200℃以下にすることが必要である。

【0081】とのようにして得られた感光性ドライフィルムレジストとFPCを張り合わせる工程について説明する。この工程は、予め銅箔等の導電体によって回路が形成されたFPCの導電体面を感光性ドライフィルムレジストにより保護する工程である。具体的に、FPCと感光性ドライフィルムフィルムレジストをあわせて、熱ラミネート、熱プレス或いは熱真空ラミネートにより張り合わせる。この時の温度は、熱によりエポキシ或いは、2重結合・3重結合がつぶれてしまわない温度で行うことが望ましく、具体的には180℃以下好ましくは、150℃以下、さらに好ましくは130℃以下である。

【0082】つぎに、この被膜に、所定のパターンのフォトマスクを介して光を照射した後、塩基性溶液により未露光部を溶解除去して、所望のパターンを得る。この現像工程は、通常のポジ型フォトレジスト現像装置を用いて行ってもよい。

【0083】現像液としては、塩基性水溶を用いること ができる。例えば、現像液は、塩基性を呈する水溶液、 一種類の化合物の溶液でもよく、2種類以上の化合物の 溶液でもよい、塩基性溶液は、通常、塩基性化合物を水 に溶解した溶液である。塩基性化合物の濃度は、通常0 ・1~50重量/重量%とするが、支持基板等への影響な どから、0.1~30重量/重量%とすることが好ましい。 なお、現橡液は、ポリイミドの溶解性を改善するため、 メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロピル アルコール、N-メチルー2-ピロリドン・N, N-ジメチ ルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド等の水溶 性有機済媒を一部含有していてもよい。上記塩基性化合 物としては、例えば、アルカリ金属、アルカリ土顆金属 またはアンモニウムイオンの、ホ酸化物または炭酸塩 や、アミン化合物などが挙げられ、具体的には、2一ジ メチルアミノエタノール、3-ジメチルアミノ-1-プロ

メチルアミノー1ーペンタノール、6ージメチルアミノー 1-ヘキサノール、2-ジメチルアミノ-2-メチル-1-プロパノール、3-ジメチルアミノ-2,2一ジメチルー 1-プロパノール、2-ジエチルアミノエタノール、3-ジエチルアミノー1-プロパノール、2-ジイソプロビル アミノエタノール、2-ジ-n-ブチルアミノエタノー ル、N, N-ジベンジル-2-アミノエタノール、2-(2 -ジメチルアミノエトキシ) エタノール、2- (2-ジエ チルアミノエトキシ) エタノール、1-ジメチルアミノ -2-プロパノール、1-ジエチルアミノ-2-プロパノ 10 ール、N-メチルジエタノールアミン、N-エチルジエタ ノールアミン、N-n-ブチルジエタノールアミン、N-t - ブチルジエタノールアミン、N─ラウリルジエタノー ルアミン、3-ジエチルアミノ-1,2-プロパンジオー ル、トリエタノールアミン、トリイソプロパノールアミ ン、N-メチルエタノールアミン、N-エチルエタノール アミン、N-n-ブチルエタノールアミン、N-t-ブチル エタノールアミン、ジエタノールアミン、ジイソプロパ ノールアミン、2-アミノエタノール、3-アミノー1-プロパノール、4ーアミノー1ープタノール、6ーアミノ -1-ヘキサノール、1-アミノ-2-プロパノール、2-アミノー2,2-ジメチルー1-プロパノール、1-アミノ ブタノール、2-アミノ-1-ブタノール、N-(2-アミ ノエチル) エタノールアミン、2-アミノ-2-メチルー 1、3-プロパンジオール、2-アミノ-2-エチルー1、3 -プロパンジオール、3-アミノ-1,2-プロパンジオ ール、2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1、3-プロパ ンジオール、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸 化アンモニウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸 アンモニウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウ ム、炭酸水素アンモニウム、テトラメチルアンモニウム ヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシ ド、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド、テトラ イソプロピルアンモニウムヒドロキシド、アミノメタノ ール、2-アミノエタノール、3-アミノプロパノール、 2-アミノプロパノール、メチルアミン、エチルアミ ン、プロピルアミン、イソプロピルアミン、ジメチルア ミン、ジェチルアミン、ジプロピルアミン、ジイソプロ ピルアミン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、ト リプロピルアミン、トリイソプロピルアミンなどを用い 40 ることが好ましいが、水に或いはアルコールに可溶であ り、溶液が塩基性を呈するものであれば、これら以外の 化合物を用いてもかまわない。

【0084】現像によって形成したパターンは、次いで リンス液により洗浄して、現像溶剤を除去する。リンス 液には、現像液との混和性の良いメタノール、エタノー ル、イソプロピルアルコール、水などが好適な例として あげられる。上述の処理によって縛られたパターンを、 20℃から200℃までの選ばれた温度で加熱処理する

が高解俊度で縛られる。との樹脂パターンは、耐熱性が 高く、機械特性に優れる。このようにして本発明の感光 性ドライフィルムレジストをもちいてFPCのカバーレ イを作成することができる。

[0085]

【実施例】以下、実施例により本発明を具体的に説明す るが、本発明はこれら実施例のみに限定されるものでは ない。

【0086】実施例中、ESDAは、2,2-ビス(4 -ヒドロキシフェニル)プロパンジベンゾエート-3, 3 ', 4, 4' - テトラカルボン酸二無水物、BAPS -Mは、ビス[4-(3-アミノフェノキシ)フェニル] スルフォン、DMAcは、N、N-ジメチルアセトアミ ド、DMFは、N、N-ジメチルフォルムアミドを表 す。熱分解開始温度はセイコー電子工業製 TG/DT A220により、空気中昇温速度10℃/分で室温から 500℃までの温度範囲を測定し、重量減少が5%とな った温度を熱分解開始温度とした。弾性率の測定は、J IS C 2318に準じた。ピール接着強度は、JI S C 6481の引き剥がし強度(90度)に準じて 行った。ただし、幅は、3mm幅で測定し、1cmに換 算した。重量平均分子量は、Waters製GPCを用 いて以下条件で測定した。(カラム: Shodex製 KD-806M 2本、温度60℃、検出器:RI、流 量: 1 m 1 / 分、展開液: DMF(臭化リチウム0.0 3M、リン酸0.03M)、試料濃度:0.2wt%、 注入量:20μ1、基準物質:ポリエチレンオキサイ ド) COOH当量とは、COOH一個あたりの平均分子 量を意味する。

【0087】実施例における感光性ドライフィルムレジ ストおよび三層構造シートの作製、感光性ドライフィル ムレジストの評価は以下のように行った。

(1) 感光性ドライフィルムレジストの作製

可溶性ポリイミド(B)成分を有機溶媒に固形分30重 量%になるように調整した溶液に、(A)フォスファゼ ン化合物、(C)炭素間二重結合を1個以上有する化合 物、及び(D)成分として光反応開始剤を混合し、感光 性樹脂組成物のワニスを調整する。

【0088】との感光性樹脂組成物のワニスをPETフ ィルム (厚み25μm)上に乾燥後の厚みが25μmに なるように塗布し、45℃で5分、続いて65℃で5分 乾燥して有機溶剤を除去することにより、PETフィル ム上にBステージ化した感光性フィルム層を形成させ、 PETフィルムにBステージ化した感光性フィルムを積 層してなる感光性ドライフィルムレジストを作製した。 【0089】次いで、保護フィルムとしてポリエチレン 樹脂とエチレンビニルアルコール樹脂の共重合体からな る積水化学(株)製プロテクト(#6221F)フィル ムを感光性フィルム層面に接するようにラミネートして ことにより、本発明のポリイミドからなる樹脂パターン SO 三層構造シートからなる感光性ドライフィルムレジスト

を作製した。ラミネート条件はロール温度40℃、ニップ圧は1500Pa・mとした。

(2)感光性ドライフィルムレジストの評価 作製した感光性ドライフィルムレジストについて以下の 方法により諸特性の評価を行った。

<ボリイミドフィルムとの積層体の難燃性試験>プラスチック材料の難燃性試験規格UL94に従い、以下のように難燃性試験を行った。上記三層構造シートからなる感光性ドライフィルムから保護フィルムを剥離後、遮光しながら、感光性フィルム層面を、25μm厚のボリイミドフィルム(鐘淵化学工業(株)製、25AHフィルム)に100℃、20000Pa・mでラミネートする。次に、400nmの光を600mJ/cm²だけ露光してから支持体フィルムを剥離し、180℃のオーブンで2時間加熱キュアを行う。

【0090】とのように作製したサンプルを寸法1.27 c m幅×12.7 c m長さ× 50μ m厚み(ポリイミドフィルムの厚みを含む)にカットしたものを20本用意する。

【0091】20本のうち10本はΦ23℃/50%相対湿度/48時間で処理し、残りの10本はΦ70℃で168時間処理後無水塩化カルシウム入りデシケーターで4時間以上冷却する。

【0092】 これらのサンブルの上部をクランプで止めて垂直に固定し、サンブル下部にバーナーの炎を10秒間近づけて着火する。10秒間経過したらバーナーの炎を遠ざけて、サンブルの炎や燃焼が何秒後に消えるか測定する。各条件(①、②)につき、サンブルからバーナーの炎を遠ざけてから平均(10本の平均)で5秒以内、最高で10秒以内に炎や燃焼が停止し自己消火したものが合格である。1本でも10秒以内に消火しないサンブルがあったり、炎がサンブル上部のクランブのところまで上昇して燃焼するものは不合格とした。

<現像性>三層構造シートの保護フィルムを剥離後、感 光性ドライフィルムレジスト面を電解銅箔35μmの光 沢面に積層し、遮光しながら100℃、2000Pa・ mでラミネート加工した。この積層体の支持体フィルム の上にマスクパターンをのせ、波長400nmの光を3 00mJ/cm'だけ露光する。 このサンブルの支持体 フィルムを剥離した後、スプレー現像機(サンハヤト (株) 製エッチングマシーンES-655D) を用い て、1%の水酸化カリウムの水溶液(液温40℃)、ス プレー圧 0.85MPa、現像液への露出時間 2分間の 条件で現像した。露光する前にカバーフィルムの上にの せるフォトマスクパターンは、100 x 100 μ m 角の 微細な穴を描いたものである。現像によって形成したバ ターンは、次いで蒸留水により洗浄して、現像液を除去 し、乾燥させる。100 x 100 μ m 角の穴が現像でき ていれば、合格とした。

【0093】 <合成例1> (原料ホスファゼンの合成)

還流冷却器、温度計、撹拌機、三塩化リン滴下器及び塩 素ガス吹き込み管を備えた5しのフラスコにクロルベン ゼン2. 5 L、塩化アンモニウム182. 5 g (3.4 モル)及び塩化亜鉛2.5gを仕込んで混合分散液を得 た。該分散液を温度130℃に加熱して還流下で三塩化 リン425.5gを9g/分の速度で48分間にわたっ て滴下すると同時に塩素ガス227gを5g/分の速度 で46分間にわたって供給した。三塩化リン及び塩素ガ スを供給した後、更に150分間還流(131℃)を行 って反応を完結した。次いで吸引濾過して未反応の塩化 アンモニウムを除去し、濾液を1.0~3.0hPaの 減圧下にて30~50℃でクロルベンゼンを留去して反 応生成物352gを得た。該反応生成物の三塩化リンを 基準とした収率は98.1%であった。クロルベンゼン に再溶解し、再結晶によってヘキサクロロシクロトリホ スファゼン及びオクタクロロシクロテトラホスファゼン の混合物(226g, ヘキサクロロシクロトリホスファ ゼン:76%、オクタクロロシクロテトラホスファゼ ン:24%)を得た。再結晶で残ったクロルベンゼン溶 液を濃縮し、環状及び鎖状のクロロホスファゼン(一般 式(1)のホスファゼン化合物のR'O-基及びR'O-基の代わりに塩素原子がそれぞれ置換したもので、nが 3~15の混合物) 125gを得た。また、先に得たへ キサクロロシクロトリホスファゼン及びオクタクロロシ クロテトラホスファゼンの混合物を、ヘキサンを用い3 回再結晶することで、純度99.9%のヘキサクロロシ クロトリホスファゼン155gを得た。

<合成例2>(ヒドロキシ基を有するホスファゼンの合成)

還流冷却器、温度計、撹拌機、滴下ロートを備えた2L の4ツ口フラスコに純度99.9%のヘキサクロロシク ロトリホスファゼン58g(1ユニットモル、NPC1 2を1 ユニットとする)、テトラヒドロフラン100m Lを仕込んで溶液を得た。次に別に調製した 4-メト キシフェノールのナトリウム塩のテトラヒドロフラン (THF) 溶液 (4-メトキシフェノール149.0g (1. 2モル)、ナトリウム25.3g(1.1g-a tom)、テトラヒドロフラン600mL)を撹拌しな がら、2時間かけて上記ヘキサクロロシクロトリホスフ 40 ァゼンのTHF溶液に滴下した。ナトリウム塩の約1/ 3量を加えるまでは激しい発熱があり、冷却しながら滴 下反応を行った。残り2/3量の添加時には激しい発熱 反応にならないが、反応温度を30℃以下になるように 適宜冷却して反応を行った。滴下終了後、引き続き12 時間室温下での撹拌反応を行った。次に反応完結のため に溶媒還流下で6時間反応を行った。反応終了後、溶媒 のTHFを減圧下に留去し、次にトルエン500mLを 加えて再溶解し、更に水500mLを加えて分液ロート 中にて有機層の分液を行った。有機層を5%水酸化ナト 50 リウム水溶液500mLで3回洗浄し、更に、(1+

9) 塩酸水溶液500mLで1回、5%炭酸水素ナト リウム水500mLで1回、水500mLで2回洗浄し た。この時の水層のpHは7~8であった。有機層を分 液し、無水硫酸マグネシウムで脱水処理し、トルエンを 留去して黄色固体状のヘキサ(4-メトキシフェノキ シ) シクロトリホスファゼン138.4g (収率95 %)を得た。残存塩素量は0.02%で、融点は104 ℃ (文献値103~104℃) であった。上記の方法で 得たヘキサ(4-メトキシフェノキシ)シクロトリホス ファゼン130.6g(0.45ユニットモル)とピリ ジン塩酸塩1040g (9モル)を、2Lの4ツ口フラ スコに仕込み、徐々に昇温し、205~210℃で1時 間反応を行った。室温冷却後、水300mLを加えて反 応生成物及び過剰のピリジン塩酸塩を溶解し、20%水 酸化ナトリウム水溶液で p H 6~7 に反応溶液を調製し た。次に酢酸エチル500mLを用いて抽出を4回行っ た後に、抽出液を合わせて、飽和硫酸ナトリウム水50 OmLで4回洗浄し、有機層を分液し、無水硫酸マグネ シウムにより脱水処理後、減圧下にて酢酸エチルを留去 した。次に濃縮物をメタノール200mLに溶解し水 1.5 L中に投入し、結晶を析出させる工程を3回繰返 して行い、得られた結晶を減圧乾燥し、淡黄色結晶9 4.8g(収率80%)を得た。生成物の残存塩素量は 0.01%以下であり、分析化学便覧(日本分析化学会 編)、有機編、第316頁に記載されている無水酢酸及 びピリジンによるアセチル化法により、水酸基(OH, %)を定量したところ、12.9%であった(理論値1 2. 9%、組成式N,P,(OC,H,OH)。)。また、1 H-及び31P-NMR分析を行い合成を確認した。融点 は238℃であった。

<合成例3>(ヒドロキシ基を有するホスファゼンの合 成)

合成例1にて合成したヘキサクロロシクロトリホスファ ゼン及びオクタクロロシクロテトラホスファゼンの混合 物(ヘキサクロロシクロトリホスファゼン:82%, オ クタクロロシクロテトラホスファゼン:18%)58g (0.5ユニットモル)を使用した他は合成例2と同様 の方法により4-メトキシフェノキシ誘導体を得た。収 量は138.7g(収率95%)で、残存塩素量は0. 02%で、淡黄色固体であった。上記により得た4-メ トキシフェノキシ誘導体131.1g(0.45ユニッ トモル)を使用した他は合成例2と同様の方法によりメ チル基の除去を行った。得られた生成物は淡茶色固体で 収量98.6g(収率75%)であった。生成物の残存 塩素量は0.01%以下であり、1H-及び31P-NM R分析を行い、合成を確認した。また、水酸基含量は1 2.8%であった。

<合成例4>(ヒドロキシ基を有するホスファゼンの合

ン58g(0.5ユニットモル)を使用した他は合成例 2と同様の方法により4-メトキシフェノキシ誘導体を 得た。収量は135.7g(収率93%)で、残存塩素 量は0.04%で、黄色高粘稠体であった。上記により 得た4-メトキシフェノキシ誘導体131.1g(0. 45ユニットモル)を使用した他は合成例2と同様の方 法によりメチル基の除去を行った。得られた生成物は淡 茶色、髙粘稠体で収量98.6g(収率75%)であっ た。生成物の残存塩素量は0.01%以下であり、1H -及び31P-NMR分析を行い、合成を確認した。水酸 基含量は12.7%であった。

<合成例5>(部分的にヒドロキシ基を有するホスファ

ゼンの合成) 還流冷却器、温度計、撹拌機、滴下ロートを備えた2 L の4ツ口フラスコに純度99.9%のヘキサクロロシク ロトリホスファゼン58g(0.5ユニットモル、NP Cl,を1ユニットとする)、THF100mLを仕込 んで溶液を得た。次に別に調製した4-メトキシフェノ ールのNa塩のTHF溶液(4-メトキシフェノール6 20 3.3g(0.55モル)、ナトリウム11.5g (0.5g-atom), 7+5+4000L)を撹拌しながら、1時間かけて上記へキサクロロシ クロトリホスファゼンのTHF溶液に滴下した。反応は 激しい発熱であるので、反応温度が30℃ を越えない ように適宜冷却して反応を行った。滴下終了後、引き続 き6時間60℃ で撹拌反応を行った。該反応にて得ら れた部分置換体の残存塩素量は17.20%であり、推 定構造は、N,P,Cl,,,,(OC,H,OCH,),,,,で ある。次に別に調製したナトリウムフェノラートのTH F溶液(フェノール61.2.3g(0.65モル)、 ナトリウム14.4g(0.6モル)、THF200m L)を、反応温度が30℃以下になるように冷却制御 し1時間かけて滴下した。次いで室温下で5時間、還流 温度で3時間反応を行い、反応を完結した。反応終了 後、溶媒のTHFを減圧下に留去し、次にトルエン50 OmLを加えて生成物を再溶解し、更に水300mLを 加えて水洗分液した。有機層を5%水酸化ナトリウム水 溶液による洗浄及び2%水酸化ナトリウム水溶液による 洗浄を各々1回行った後に、(1+9)塩酸水溶液で1 回洗浄、5%炭酸水素ナトリウム水で1回洗浄し、さら に水で2回洗浄し、水層を中性とした。次に有機層を分 液し、無水硫酸マグネシウムで脱水し、トルエンを留去 して淡黄色油状の生成物122.2g(収率93%)を 得た。残存塩素量は0.01%以下であった。上記の方 法で得た4-メトギシフェノキシ基とフェノキシ基が混 合置換したシクロトリホスファゼン130.6g(0. 5 ユニットモル) とピリジン塩酸塩583.6g(5. 05モル)を、2Lの4ツ□フラスコに仕込み、徐々に 昇温し、205~210℃で1時間反応を行った。その 合成例1にて合成した環状及び鎖状のクロロホスファゼ 50 後の操作は合成例2と同様に行い、黄色固体98.7g

(収率80%)を得た。残存塩素量は0.01%以下であり、水酸基含有量は6.8%であった。(理論値6.9%、組成式N,P,(OPh),,,(OC6H4OH),,,,)

<合成例6>(アクリロイルオキシ基を有するホスファゼンの合成)

撹拌装置、遠流冷却器、温度計を備えた1 L 反応器に合成例2で合成したヘキサ(4-ヒドロキシフェノキシ)シクロトリホスファゼン39.5g(0.15ユニットモル)、アクリル酸クロライド28.5g(0.32モ 10ル)、合成ゼオライト(3A)100g及びアセトニトリル350mLを仕込み、還流下で24時間反応を行った。反応終了後、合成ゼオライトを濾過により除き、濃縮する事で、黄色固52.9g(収率95%)を得た。前記アセチル化法により水酸基は残存していないことを確認した。また、1H-及び31P-NMR分析を行い、ヒドロキシ基がアクリロイルオキシ基に変換できたことを確認した。

<合成例7 > (メタクリロイルオキシ基を有するホスファゼンの合成)

合成例3にて合成したヒドロキシ基を有するシクロトリホスファゼン及びシクロテトラホスファゼンの混合物39.5g(0.15ユニットモル)及びメタクリル酸クロライド33.0g(0.32モル)を使用した他は合成例6と同様の方法により、黄色固体56.3g(収率94%)のメタクリロイルオキシ基を有するフェノキシホスファゼンを得た。前記アセチル化法により水酸基は残存していないことを確認した。また、1H-及び31P-NMR分析を行い、ヒドロキシ基がメタクリロイルオキシ基に変換できたことを確認した。

<合成例8>(メタクリロイルオキシ基を有するホスファゼンの合成)

合成例4にて合成した環状及び鎖状のホスファゼンの混合物39.5g(0.15ユニットモル)及びメタクリル酸クロライド33.0g(0.32モル)を使用した他は合成例7と同様の方法により、黄色固体53.9g(収率90%)のメタクリロイルオキシ基を有するフェノキシホスファゼンを得た。前記アセチル化法により水酸基は残存していないことを確認した。また、1H-及び31P-NMR分析を行い、ヒドロキシ基がメタクリロ40イルオキシ基に変換できたことを確認した。

<合成例9>(アクリロイルオキシ基を有するホスファゼンの合成)

合成例5にて合成した部分的にヒドロキシ基を有するホスファゼン36.9g(0.15ユニットモル)及びアクリル酸クロライド14.5g(0.16モル)を使用した他は合成例7と同様の方法により、黄色固体43.0g(収率95%)のアクリロイルオキシ基を有するフェノキシホスファゼンを得た。前記アセチル化法により水酸基は残存していないことを確認した。また、1H-

及び31P-NMR分析を行い、ヒドロキシ基がアクリロイルオキシ基に変換できたことを確認した。

<合成例A>ポリイミドの合成

攪拌機を設置した500 mlのセパラブルフラスコにESDA 1 7.3 g (0.030 mol)、DMF 30 gを入れて、攪拌機で攪拌して溶解させる。次に、和歌山精化製のジアミンMBAA 5.15 g (0.018 mol)をDMF 9 gに溶解して加え、1 時間激しく攪拌する。さらに、シリコンジアミンKF-8010 (信越シリコーン製) 7.47 g (0.009 mol)を加え、1 時間程度攪拌する。最後に、BAPS-M 1.29 g (0.003 mol)を加えて、1 時間激しく攪拌する。このようにして得たポリアミド溶液をテフロン(R)コートしたパットにとり、真空オーブンで、200℃、5000 Paの圧力で2時間減圧乾燥し、26.40 gの可溶性ポリイミドを得た。

【0094】とうして合成したポリイミド15gをジオキソラン50gに溶解させ、Sc(固形分濃度)= 30%のワニスを作製した。

<合成例B>ポリイミドの合成

20 合成例Aで合成したポリイミド20.8g (0.020 mo1)を ジオキソラン55g に溶解し、4-メトキシフェノールを0. 030g を添加し、60°Cのオイルバスであたためながら 溶解させた。この溶液にメタクリル酸グリシジル3.75 g (0.0264 mo1)をジオキソラン5g に溶解して加え、さ らに触媒としてトリエチルアミン0.01 gを添加し60°C で6時間加熱攪拌を行った。このようにしてSc(固形分 濃度)=30%の変性ポリイミド溶液を調整した。

<合成例C>ポリイミドの合成

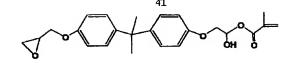
援拌機を設置した500 mlのセパラブルフラスコに4,4 '-(4,4'-イソプロピリデンジフェノキシ)ピスフタル酸無水物15.6g (0.030 mol)、DMF 30 gを入れて、攪拌機で攪拌して溶解させる。次に、和歌山精化製のジアミンMBAA 6.58 g (0.023 mol)をDMF 9 gに溶解して加え、1時間激しく攪拌する。さらに、シリコンジアミンKF-8010(信越シリコーン製)5.81 g (0.007 mol)を加え、1時間程度攪拌する。このようにして得たポリアミド溶液をテフロン(R)コートしたバットにとり、真空オーブンで、200℃、5000Paの圧力で2時間減圧乾燥し、26.0 gの可溶性ポリイミドを得た。

【0095】 このようにして合成したポリイミド17.94 g(0.020 mol)をジオキソラン68.5g に溶解し、4-メトキシフェノールを0.030g を添加し、60 $^{\circ}$ Cのオイルパスであたためながら溶解させた。この溶液に下記化合物(化19)11.4g(0.030mol)をジオキソラン5 g に溶解して加え、さらに触媒としてトリエチルアミン0.01 g を添加し60 $^{\circ}$ Cで6時間加熱攪拌を行った。このようにしてSc(固形分濃度)=30%の変性ポリイミドを合成した

[0096]

(化19)

30



<合成例D>ポリイミドの合成

撹拌機を設置した500 mlのセパラブルフラスコに2, 3,3 '、4' ービフェニルテトラカルボン酸二無水物 17.64g (0.060 mol)、DMF 50 gを入れて、攪拌機で攪拌 して溶解させる。次に、和歌山精化製のジアミンMBAA1 2.87q(0.045 mol)を加え、1時間激しく攪拌する。さら 10 リイミドを合成した。 に、シリコンジアミンKF-8010(信越シリコーン製)12. 45g (0.015mol)を加え、1時間程度攪拌する。とのよう にして得たポリアミド溶液をテフロン(R)コートした バットにとり、真空オーブンで、200℃、5000₽ aの圧力で2時間減圧乾燥し、39.0gの可溶性ポリイミ*

*ドを得た。

【0097】 このようにして合成したポリイミド27.2g (0.040 mol) をジオキソラン83.3g に溶解し、4-メト キシフェノールを0.030gを添加し、60°Cのオイルバ スであたためながら溶解させた。この溶液にこの溶液に メタクリル酸グリシジル8.95q(0.063mol)をジオキソ ラン5gに溶解して加え、さらに触媒としてトリエチル アミン0.01 qを添加し60℃で6時間加熱攪拌を行っ た。とのようにしてSc(固形分濃度)= 30%の変性ポ

42

(実施例1)以下に示す(a)~(d)成分を混合して 感光性樹脂組成物を調整し、(1)の方法でPETフィ ルム上にBステージの感光性ドライフィルムレジストを 作製した。このPETフィルム付き感光性ドライフィル ムレジストの上に保護フィルム

をラミネートして三層構造シートを作成した。

(a) 合成例6のフォスファゼン化合物

35重量部(固形分重量換算

で)

- (b) 合成例Aにより合成したポリイミド樹脂 50重量部
- (c) 炭素一炭素2重結合を有する化合物 ピスフェノールA E O変性 (m+n ≒ 30) ジアクリレート (新中村化学工 業 (株) 製NKエステルA-BPE-30) 15重量部
- (d) 光反応開始剤

3,3',4,4'-テトラ (t-ブチルパーオキシカルボニル) ベンゾフェノン

1重量部

4.4 '-ジエチルアミノベンゾフェノン

1 重量部

現像性試験を行ったところ、100μmφの微細な穴及 び100μm/100μmのラインが現像でき、合格で あった。接着強度は500Pa·mであった。また、難燃 性試験は合格であった。

(実施例2)以下に示す(a)~(d)成分を混合して※

※感光性樹脂組成物を調整し、(1)の方法でPETフィ ルム上にBステージの感光性ドライフィルムレジストを 作製した。とのPETフィルム付き感光性ドライフィル 30 ムレジストの上に保護フィルムをラミネートして三層構

造シートを作成した。

35重量部(固形分重量換算

- (b) 合成例Bにより合成したポリイミド樹脂 50 重量部
- (c) 炭素一炭素2 重結合を有する化合物 ビスフェノールA E O変性 (m+n ≒ 30) ジアクリレート (新中村化学工 業 (株) 製NKエステルA-BPE-30) 15重量部
- (d)光反応開始剤

3,3',4,4'-テトラ (t-ブチルパーオキシカルボニル) ベンゾフェノン

1重量部

4、4 '-ジエチルアミノベンゾフェノン 1重量部

現像性試験を行ったところ、100μmφの微細な穴及 び100μm/100μmのラインが現像でき、合格で あった。接着強度は500Pa・mであった。また、難燃 性試験は合格であった。

(実施例3)以下に示す(a)~(d)成分を混合して★

- ★感光性樹脂組成物を調整し、(1)の方法でPETフィ ルム上にBステージの感光性ドライフィルムレジストを 作製した。このPETフィルム付き感光性ドライフィル ムレジストの上に保護フィルムをラミネートして三層構 造シートを作成した。
 - 35重量部(固形分重量換算

(a) 合成例8のフォスファゼン化合物

(a) 合成例7のフォスファゼン化合物

(b) 合成例Cにより合成したポリイミド樹脂 50重量部

(c) 炭素-炭素2 重結合を有する化合物

44

ビスフェノールA E O変性 (m+n ≒ 30) ジアクリレート (新中村化学工業 (株) 製N K エステルA-BPE-30) 1 5重量部

(d) 光反応開始剤

ビス(2,4,6-トリメチルベンゾイル)-フェニルフォスフィンオキ

シド 1 重量部

現像性試験を行ったところ、 $100\mu m \phi$ の微細な穴及 $000\mu m / 100\mu m$ のラインが現像でき、合格であった。接着強度は500Pa・mであった。また、難燃性試験は合格であった。

* 感光性樹脂組成物を調整し、(1)の方法でPETフィルム上にBステージの感光性ドライフィルムレジストを作製した。このPETフィルム付き感光性ドライフィルムレジストの上に保護フィルムをラミネートして三層構

(実施例4)以下に示す(a)~(d)成分を混合して*10 造シートを作成した。

(a) 合成例9のフォスファゼン化合物

20重量部(固形分重量換算

で)

合成例10のフォスファゼン化合物

15重量部

- (b) 合成例Dにより合成したポリイミド樹脂 50 重量部
- (c) 炭素一炭素2 重結合を有する化合物ビスフェノールA E O変性 (m+n = 30) ジアクリレート (新中村化学工業(株)製N K エステルA-BPE-30)1 5重量部
- (d) 光反応開始剤

ビス(2,4,6-トリメチルベンゾイル)-フェニルフォスフィンオキ

シド 1重量部

現像性試験を行ったところ、 $100\mu m \phi$ の微細な穴及 $00\mu m / 100\mu m$ のラインが現像でき、合格であった。接着強度は $500 Pa \cdot m$ であった。また、難燃性試験は合格であった。

(比較例1)以下に示す(a)~(d)成分を混合して※

※感光性樹脂組成物を調整し、(1)の方法でPETフィルム上にBステージの感光性ドライフィルムレジストを作製した。このPETフィルム付き感光性ドライフィルムレジストの上に保護フィルムをラミネートして三層構造シートを作成した。

0 重量部(固形分重量換算で)

- (a)フォスファゼン化合物
- (b) 合成例Aにより合成したポリイミド樹脂 50重量部
- (c) 炭素一炭素2 重結合を有する化合物ビスフェノールA E O変性 (m+n ≒ 30) ジアクリレート (新中村化学工業(株)製N K エステルA-BPE-30)50重量部
- (d) 光反応開始剤

ビス(2,4,6-トリメチルベンゾイル)-フェニルフォスフィンオキ

シド 1重量部

現像性試験を行ったところ、 $100\mu m \phi$ の微細な穴及 $000\mu m / 100\mu m$ のラインが現像でき、合格であった。接着強度は500Pa・mであった。また、難燃性試験は不合格であった。

(比較例2)可溶性ポリイミドの代わりにメタアクリル酸の共重合体溶液(メタクリル酸メチル57重量%、メタアクリル酸23重量%、アクリル酸ブチル10重量% 40の三元共重合体のメチルエチルケトン溶液。固形分濃度32%、重量平均分子量8.5万)を50重量部とした他は、実施例1と同様にして行った。

【0098】との感光性ドライフィルムレジストの難燃性試験を行ったところ、炎をあげて燃焼し、規格UL94V-0に不合格であった。

【0099】また、現像性試験を行ったところ、100

 μ mimes100 μ m角の微細な穴が現像でき、合格であった。(但し、この際の現像液は1%炭酸ナトリウム水溶液で行った)

接着強度は400Pa・mであった。

[0100]

[0101]

【発明の効果】上記に示したように、本発明の感光性樹脂組成物は、難燃性を有し、微細なパターンを描くことが出来、フィルム状のフォトレジストおよび絶縁保護フィルム永久フォトレジストとして、フレキシブルブリント配線板やパソコンのハードディスク装置のヘッド部分に使用される感光性カバーレイフィルムにも好適に用い得る。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.'		識別記号	FI			テーマコード(参考)
G03F	7/027	502	G03F	7/027	502	
	7/037	5 0 1 5 0 4 5 1 1		7/037 7/038 7/075	501	
	7/038				5 0 4	
	7/075				5 1 1	
		5 2 1			521	

Fターム(参考) 2H025 AA10 AB11 AB15 AB17 AC01

AD01 BC14 BC32 BC42 BC69

CA01 CA20 CA27 CA28 CB25

CC20 EA08 FA03 FA17

4J011 PA97 SA21 SA22 SA31 SA63

SA64 SA76 SA84 43026 AB34 BA41 DA02

4J027 AH03 BA07 BA19 BA20 BA24

BA27 CB03 CB10